



2021年11月24日 (オンライン)

環境低負荷金属酸化物の ミクロ立体構造制御による 機能増大とデバイス応用

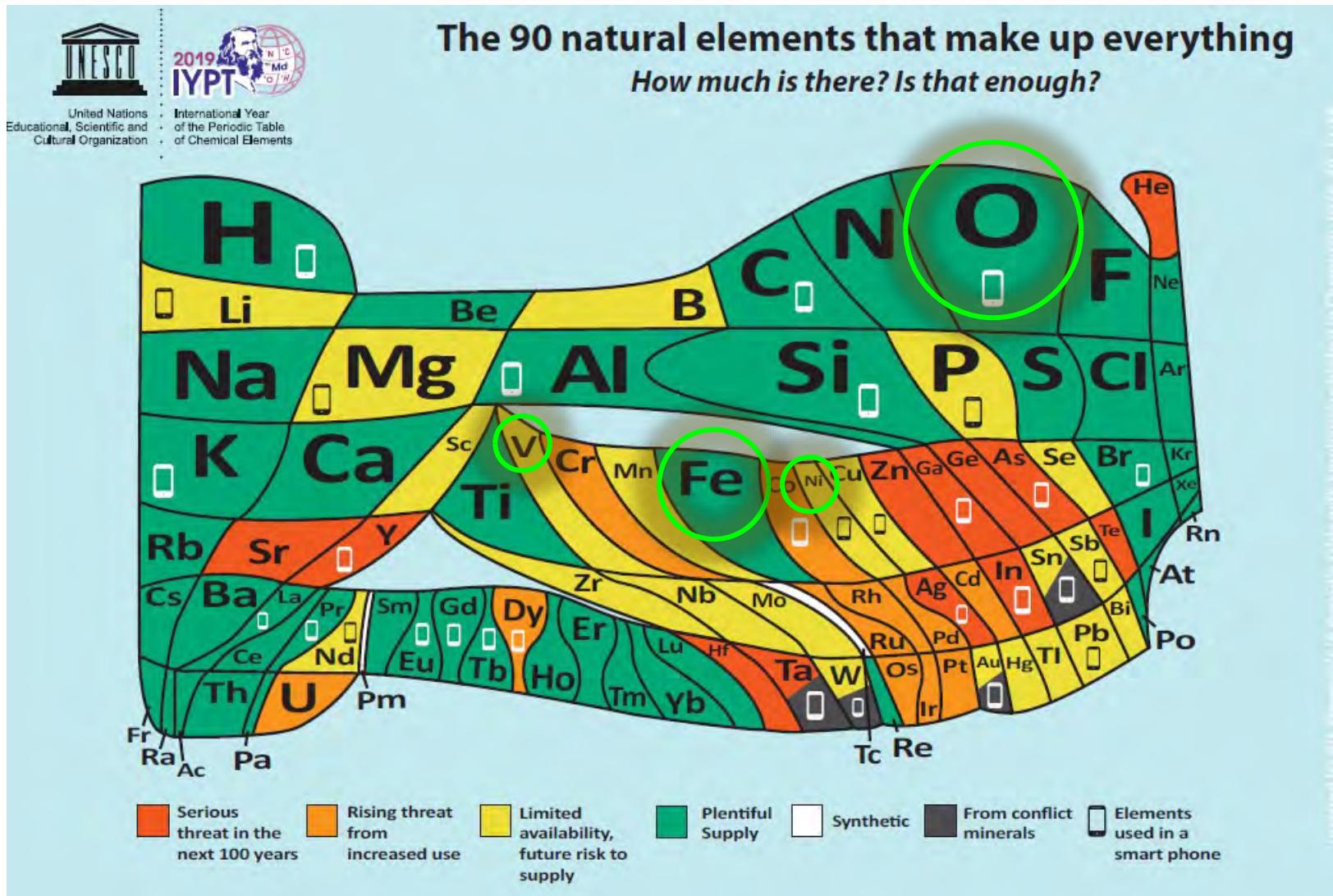


大阪大学 産業科学研究所

服部 梓
Azusa N. HATTORI



豊富な資源&安定な構造: 金属酸化物

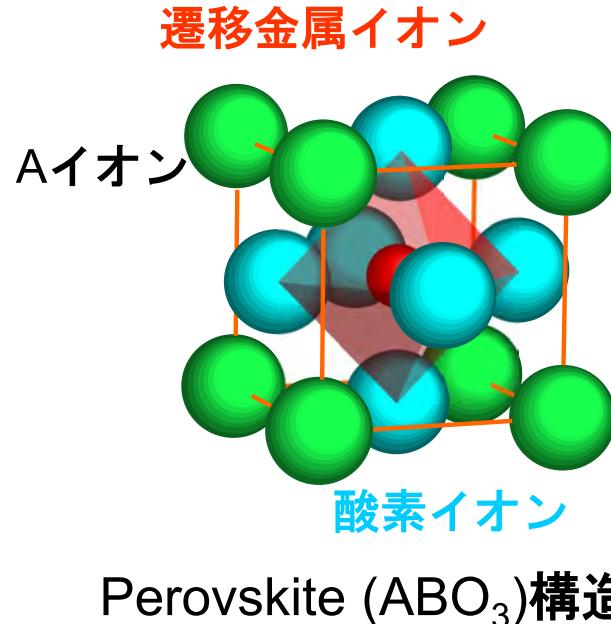


- 高いクラーク数の元素で構成
- 大気中で状態が変わらない(劣化・腐食しにくい)



3d遷移金属酸化物

多様な外場に応答する機能性物質



電子・スピン
(強相関電子系)

^{22}Ti 47.87 チタン Titanium	^{23}V 50.94 バナジウム Vanadium	^{24}Cr 52.00 クロム Chromium	^{25}Mn 54.94 マンガン Manganese	^{26}Fe 55.85 鉄 Iron	^{27}Co 58.93 コバルト Cobalt	^{28}Ni 58.69 ニッケル Nickel	^{29}Cu 63.55 銅 Copper
--	---	--	--	--	---	---	--

高/強誘電体	強磁性体 (完全スピノ偏極)	高温超伝導体
焦電体	半導体	反強磁性
圧電体	超巨大磁気抵抗	導電体

メモリ (DRAM, FRAM, RRAM)	磁気記録 磁気ヘッド	ジョセフソン接合
ピエゾ素子	インターフェクタ	ボロメータ
赤外線センサ	不揮発性 メモリ (MRAM)	電極
ガス分子センサ		SQUID 磁束計



強相関電子系材料

Mott絶縁体

強い電子相関

電子“液体”

絶縁体

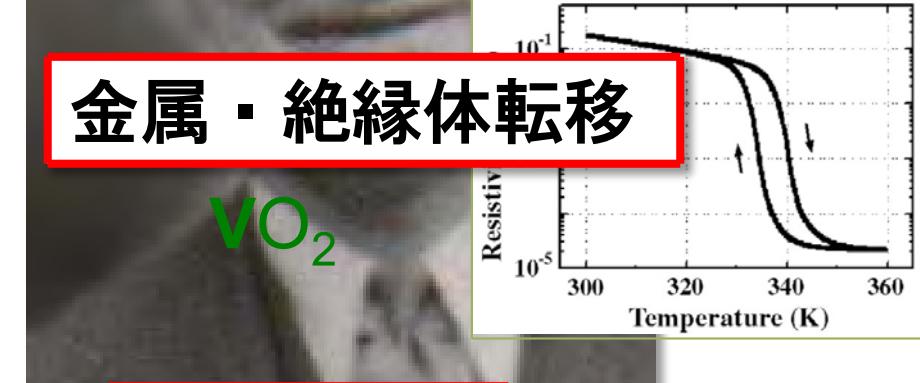


- バルク単結晶への元素置換
- 温度・磁場印加による研究

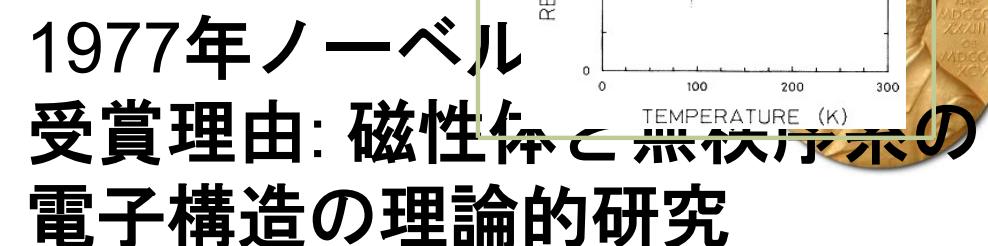
高温強磁性相転移
・超巨大磁気抵抗



金属・絶縁体転移



高温超伝導
Novel Superconductor



金属絶縁体転移

3d遷移
元素

AIオブ

Per

電子・スピ
ン
(強相関電子系)

電気伝導
磁気

状態が劇的に変化

2021デバイスとシステムの国際ロードマップ (IRDS Load Map)

Emerging Materials for non-spin beyond-CMOS

Application/Need	Emerging Material or Process Solutions	Potential Advantages	Challenges/Status
Negative gate capacitance FET	HfO ₂ doped with Zr, Al, Si, SrTiO ₃ :STO, Pb(x)Zr(1-x)TiO ₃ :PZT [1-5]	Step up voltage transformer leading to subthreshold swing lower than 60 mV/dec for an otherwise conventional MOSFET. Potential for integrating memory with logic and for non-von Neumann architectures.	Reduction of hysteresis while maintaining steep SS behavior. Reduction of interface states. Further understanding of the mechanism. Optimizing materials properties for scaled technology nodes.
	VO ₂ , SmNiO ₃ , SrTiO ₃ ...	Potential for zero off-state current and zero subthreshold swing. Inherently ambipolar. Large temperature response. Potential for BEOL integration.	Further development of refractory metals to minimize wear, friction, materials transfer, and surface oxidation.
Mott FET	VO ₂ , SmNiO ₃ , SrTiO ₃ , La _{1-x} Sr _x MnO ₃ [11-13]	Steep subthreshold swing with low off current. Potential for non-von Neumann architectures.	Understanding phase transition mechanisms. Achieving bulk electronic phase transition. Improve material growth to achieve low defect density and high carrier mobility. Improve gate oxide and interface.

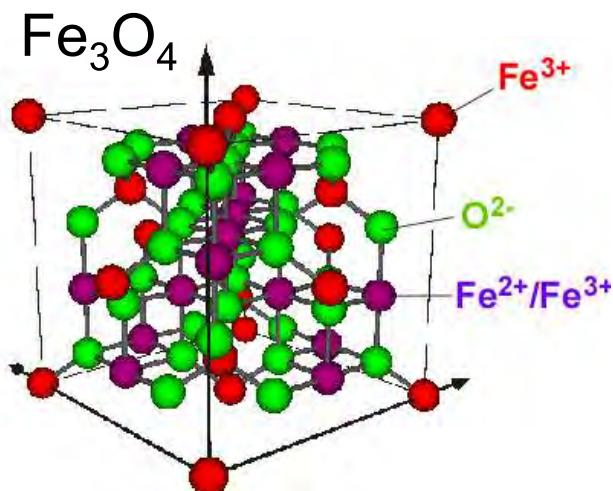
Temperature (K)

金属-絶縁体転移
Metal-Insulator transition (MIT)

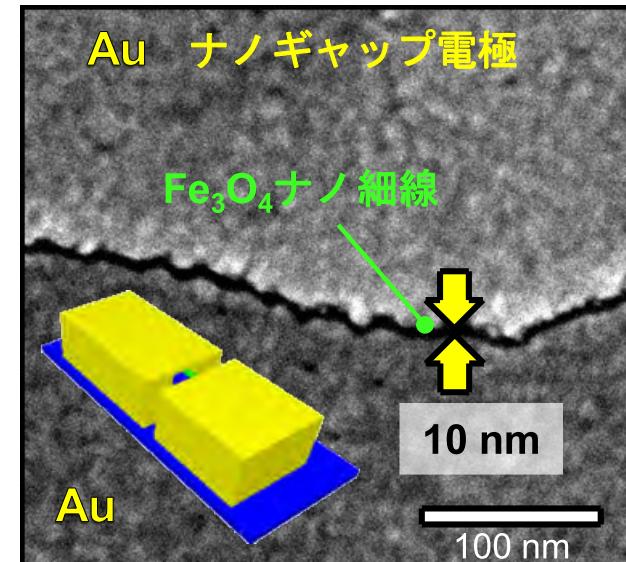
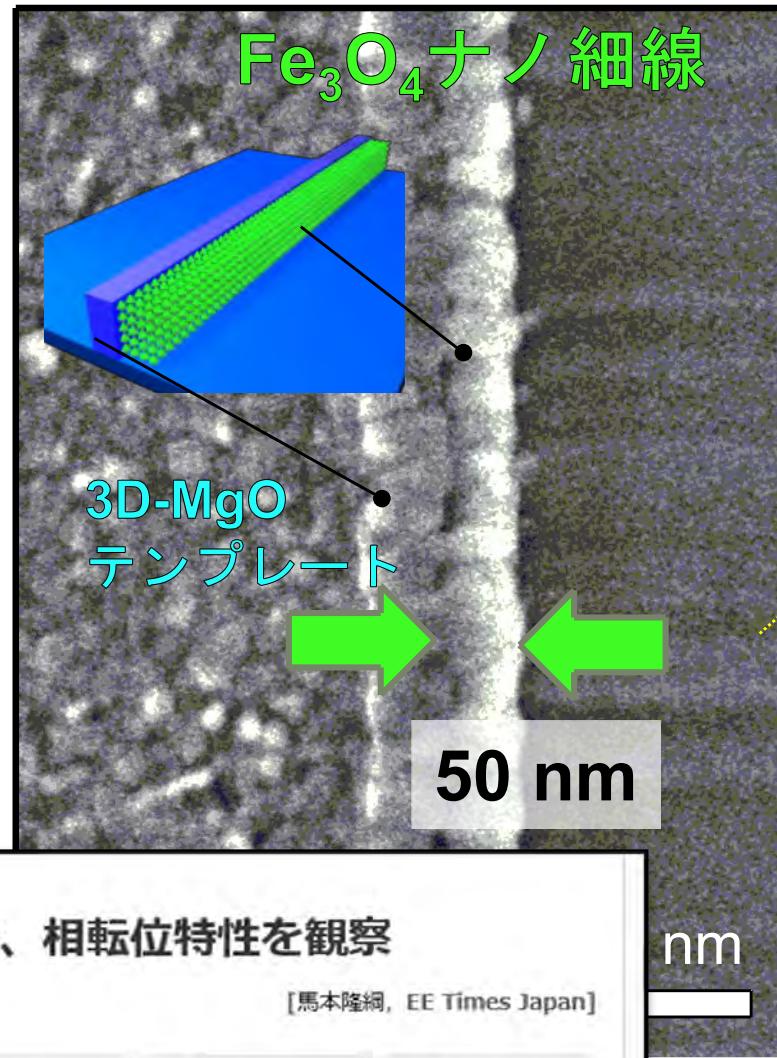




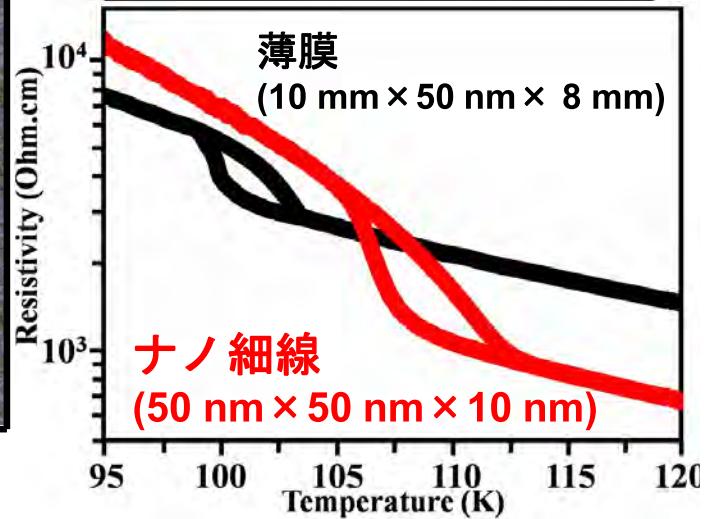
Fe₃O₄立体ナノ構造でのフェルベー転移



マグнетタイトは古代ギリシア時代から既に知られており、磁石(magnet)の語源になった物質。スピントロニクス応用などの



10 nm空間での伝導特性



阪大らが通説を覆す：
ナノ構造体のマグネットタイトで、相転位特性を観察

© 2019年07月19日 09時30分 公開

[馬本隆綱, EE Times Japan]

印刷する クリップする Share B! 10

3次元ナノテンプレートPLD法で高品質を実現

ナノサイズの金の箱

ナノサイズ化→機能向上

- 1 埋もれている特性を引き出す
- 2 反応/効果の集中
- 3 高集積化

SE

22:51

010101 WD24. 1mm 5.0kV x5.0k

10 μm

10 μm

18:15 010101 WD17. 2mm 5.0kV x100k 500

18:37 010101 WD20. 1mm 3.0kV x100k 500

78 nm
400 nm

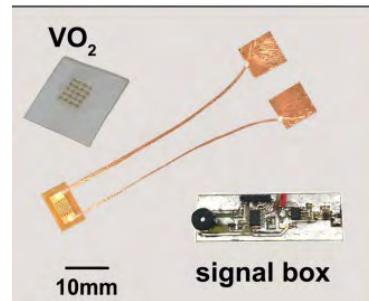
300 nm



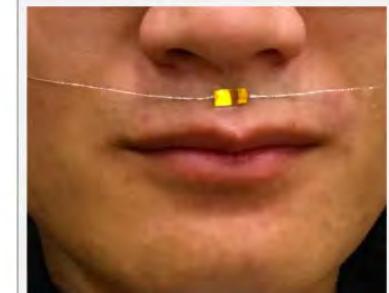
1. ボロメーター

焦電効果

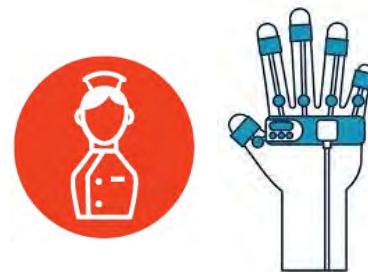
VO_2



(c)



F. Liao et al., J. Breath Res., (2017), 11, 036002.



環境計測、医療・バイオ計測、
温度分布計測、排ガスモニタ

2. プロトンレジスター

プロトエレクトロニクス/水素貯蔵

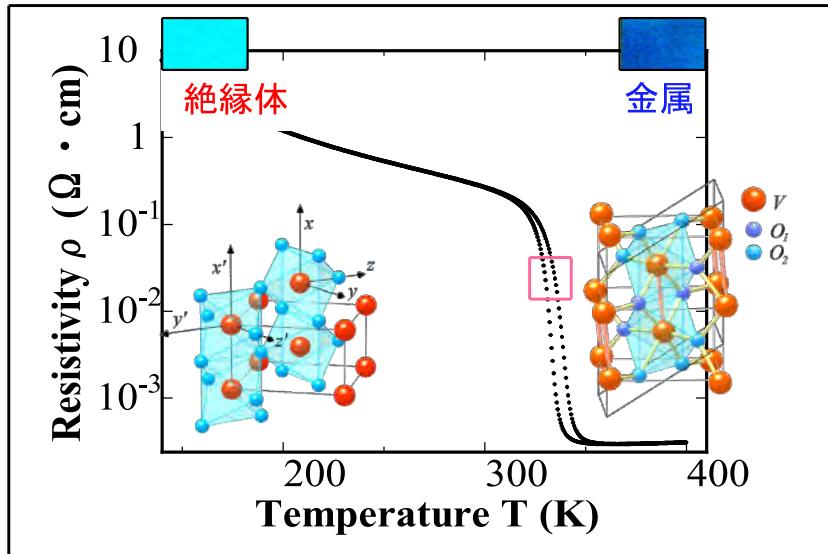
NdNiO_3





VO₂の特徴

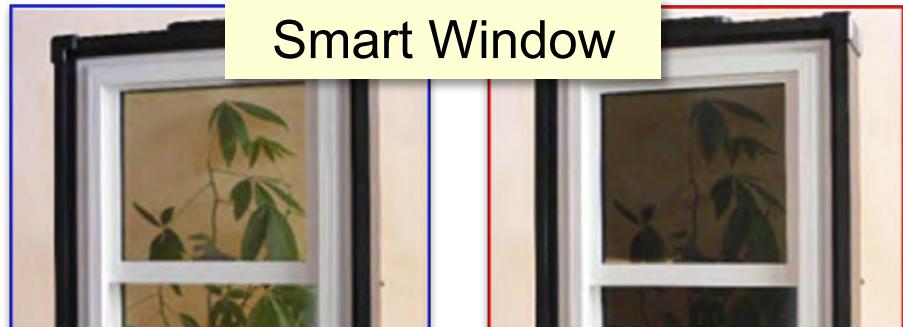
Mott転移の典型材料



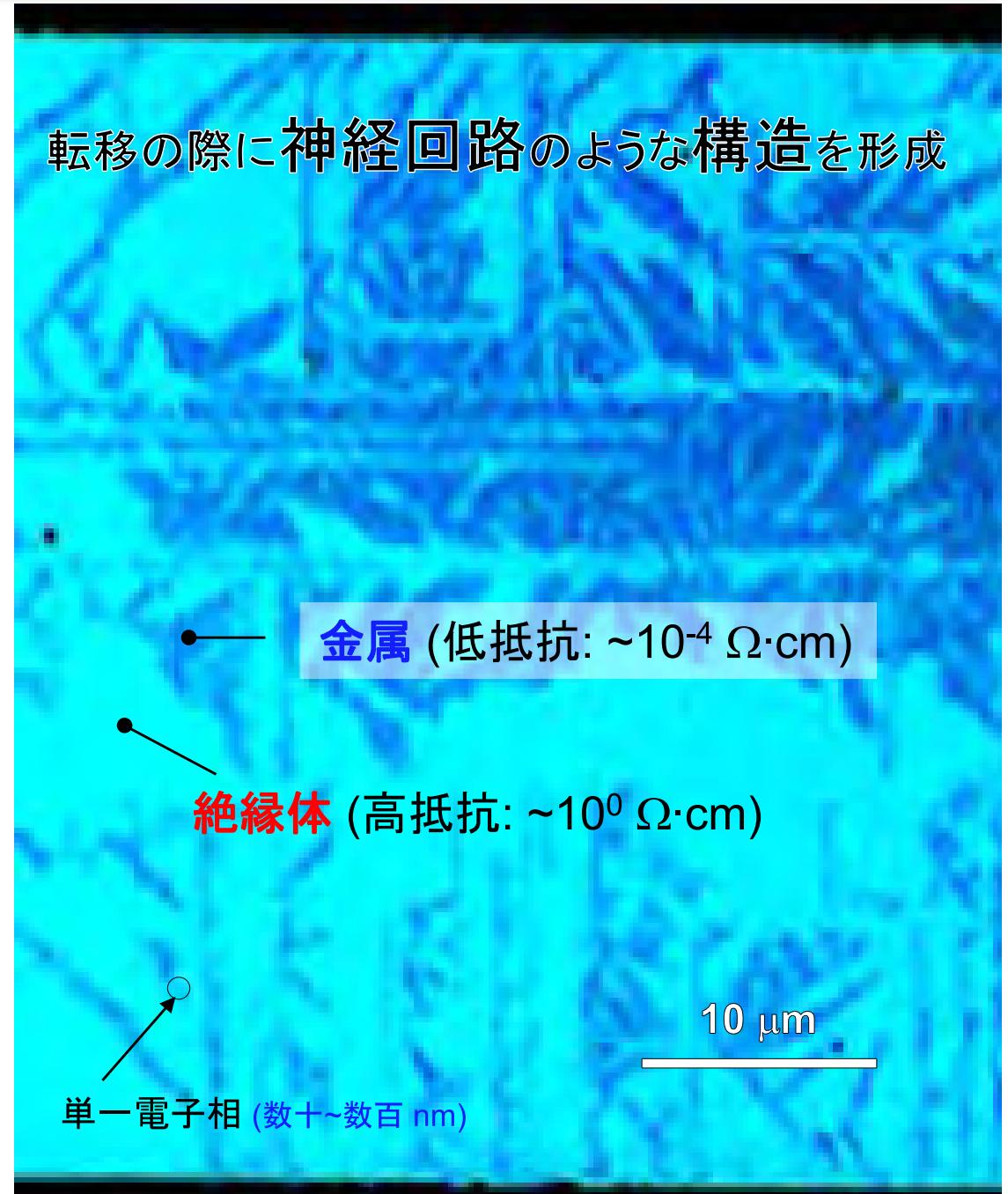
温度変化(赤外線の吸収)

↓
巨大な電気抵抗変化

低温: 絶縁体(透明-光透過性)



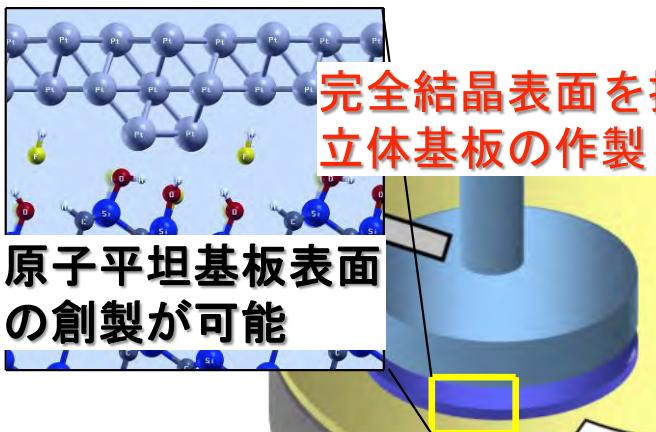
高温: 金属(灰黒色-光遮光性)





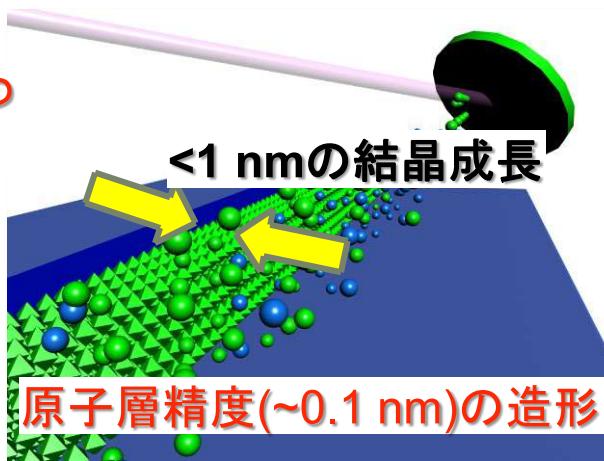
3次元ナノ超構造体創製の独自技術

触媒表面基準エッティング法



A. Isohashi *et al.*, Appl. Phys. Lett., 110, 201601 (2017)

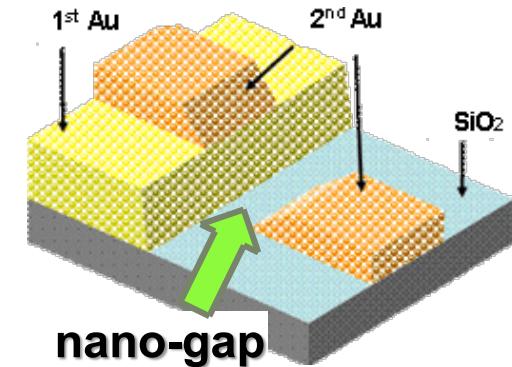
3DナノテンプレートPLD法



A. N. Hattori *et al.*, Appl. Phys. Express 7, 045201 (2014)

ナノgap電極創製技術

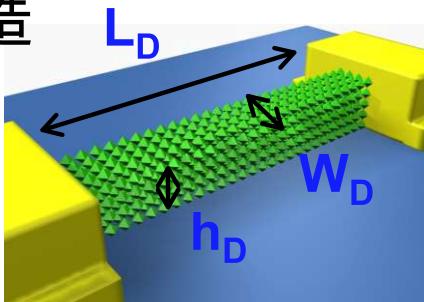
1-10 nm間隙を持つ電極作製



A. N. Hattori *et al.*, Nano Lett. 19, 5003 (2019)

位置・サイズ・形状をnm精度で
制御した3次元ナノ構造体創製を実現

デバイス構造



デバイスサイズ

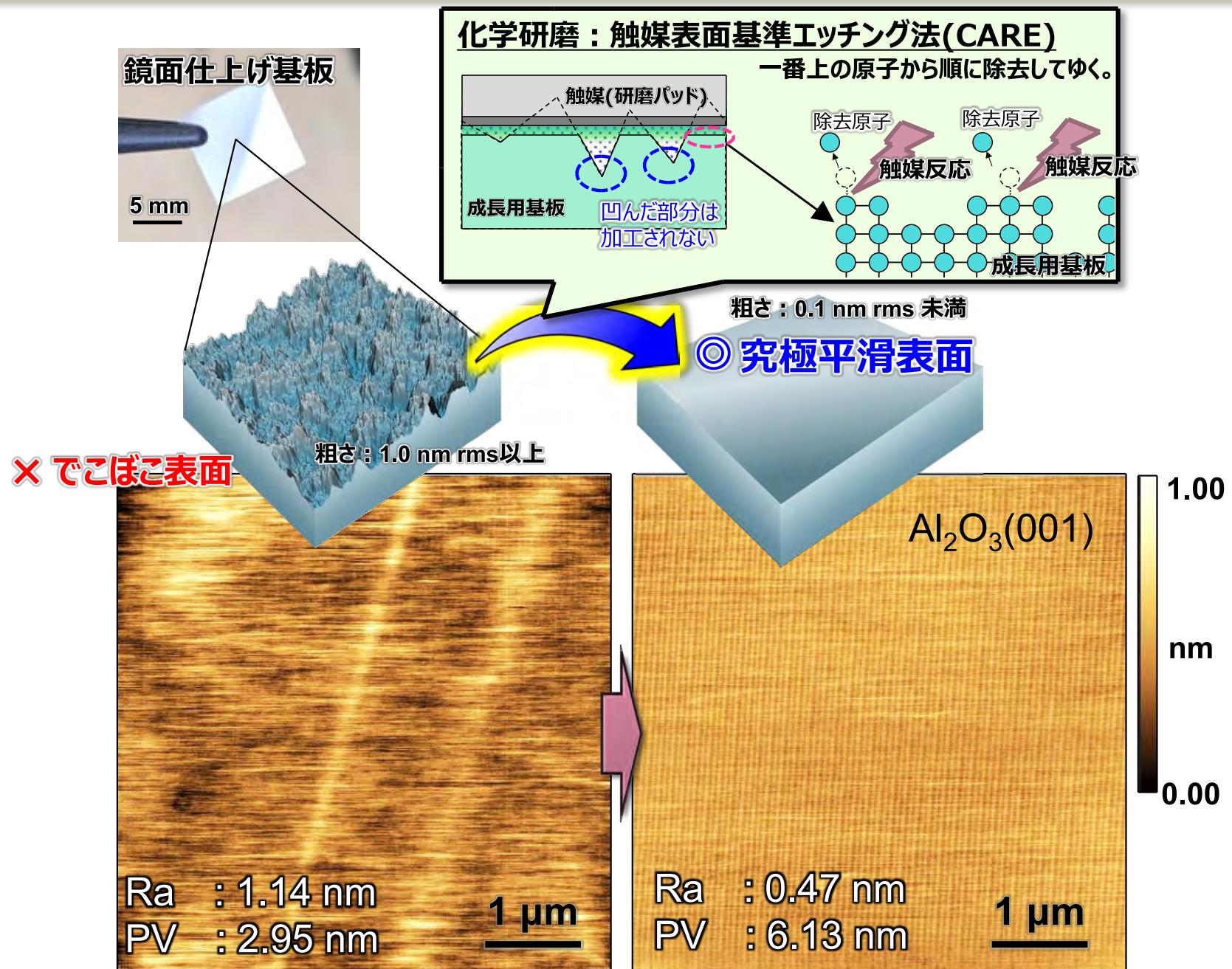
W_D = 成長厚さ(**a few** nm)

L_D = 電極間距離(**10** nm)

h_D = テンプレート高さ(**10** nm)

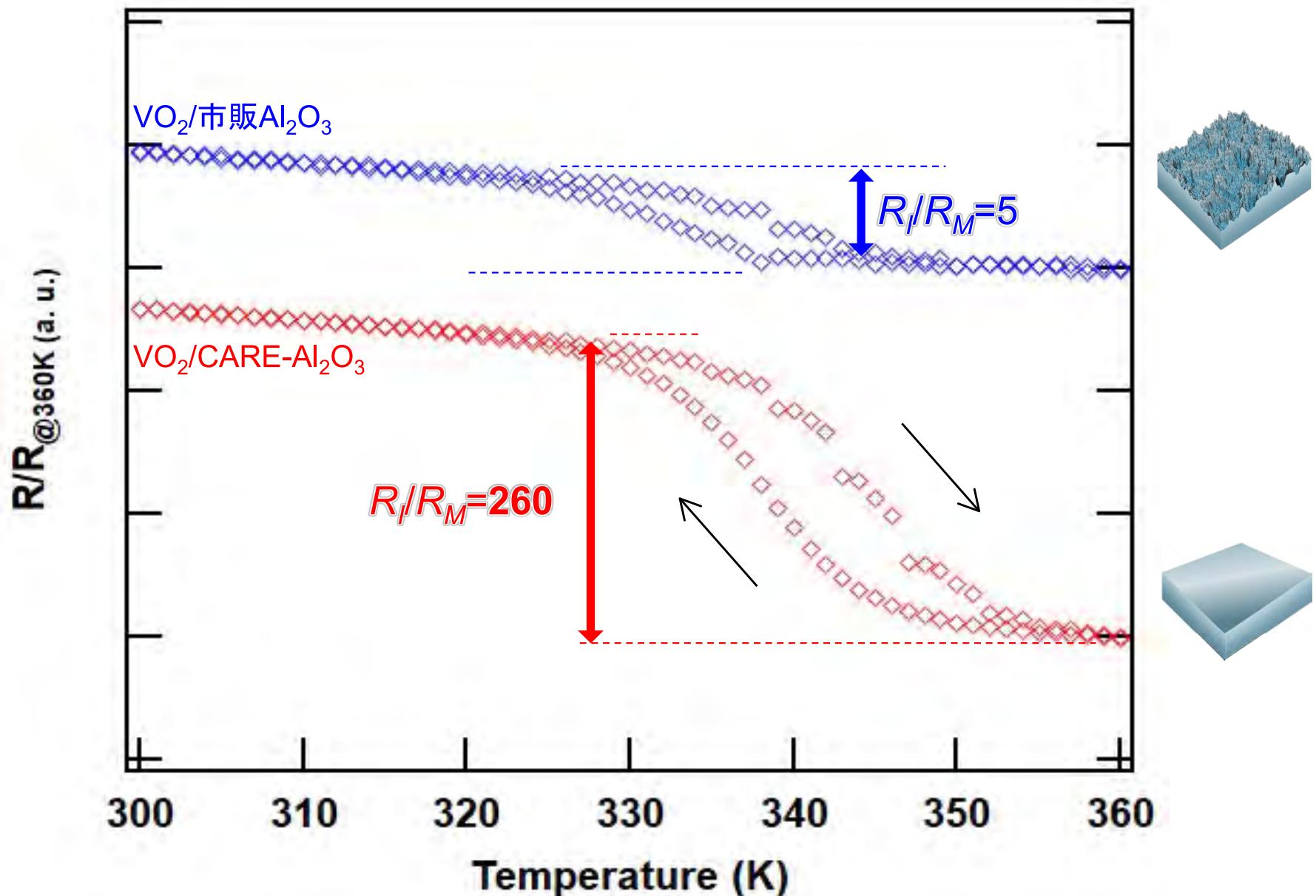


基板表面の究極化





基板表面の究極化→機能増大



金属絶縁体相転移時の抵抗変化比が向上(約50倍)



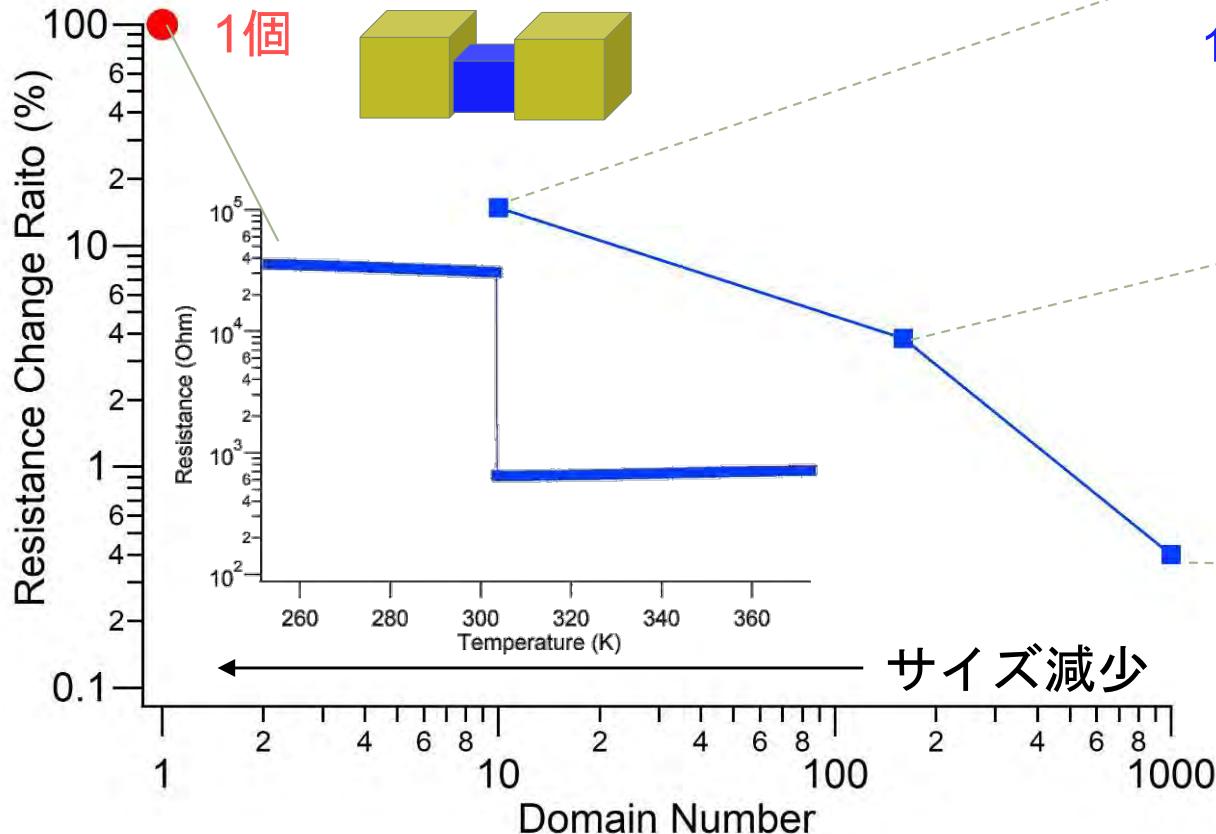
電子相閉じ込め効果と応答性

VO_2

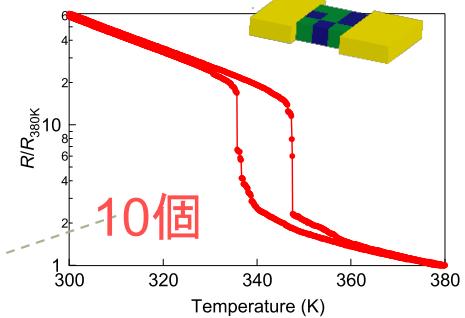
単一電子相の一次相転移
を確実に取り出せる。

原理的な最高値!

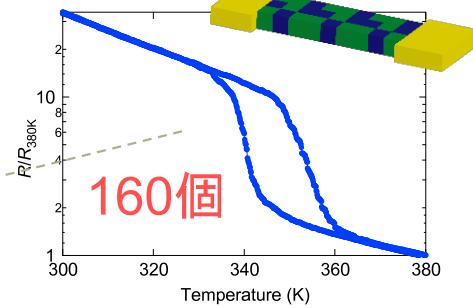
Nw +20 nm-gap



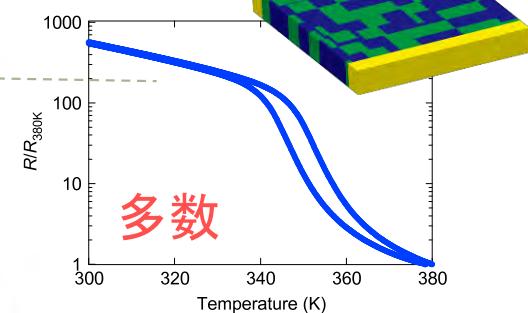
100 nm Nw +150 nm gap



100 nm Nw +2 μm gap



Film

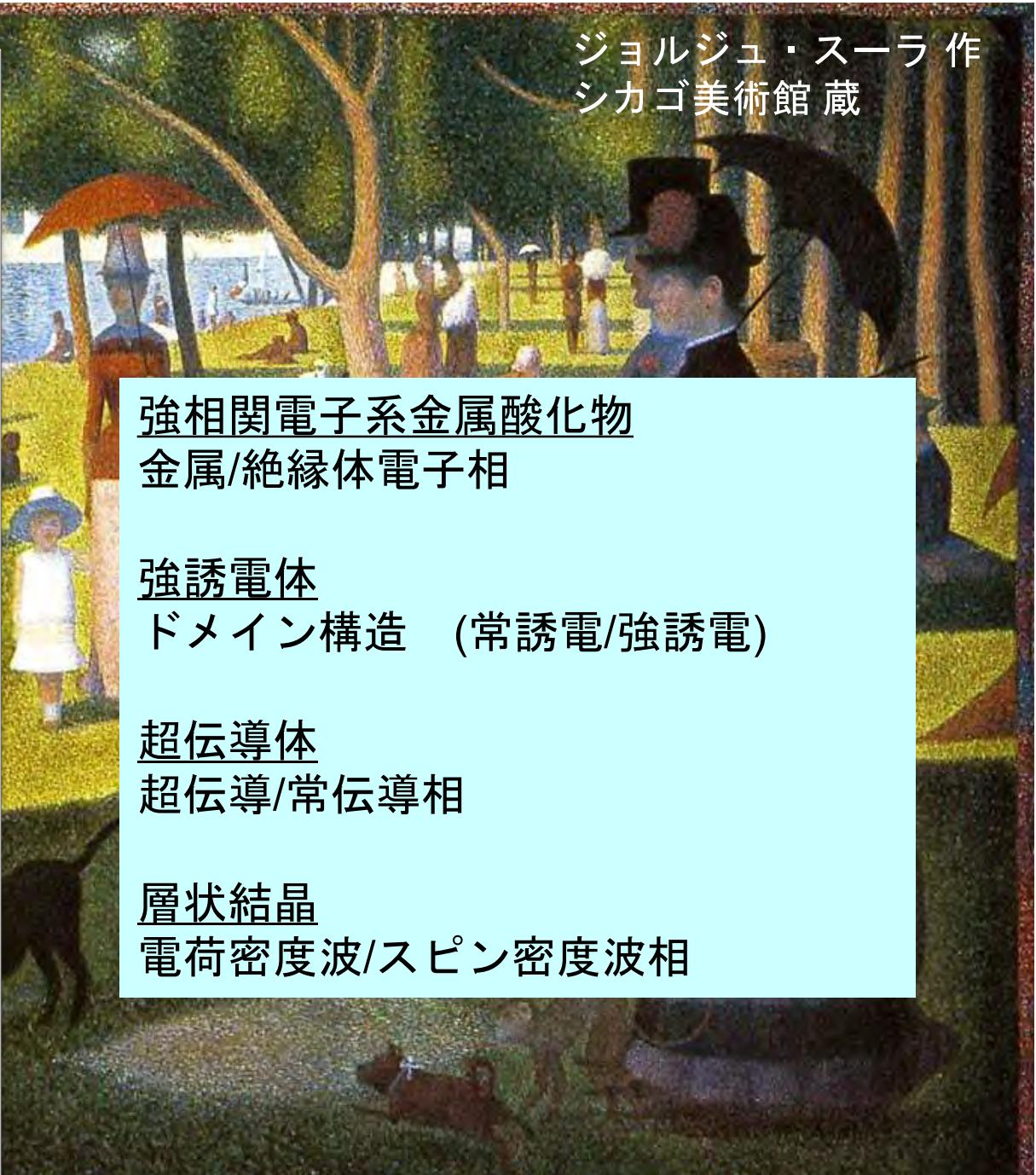
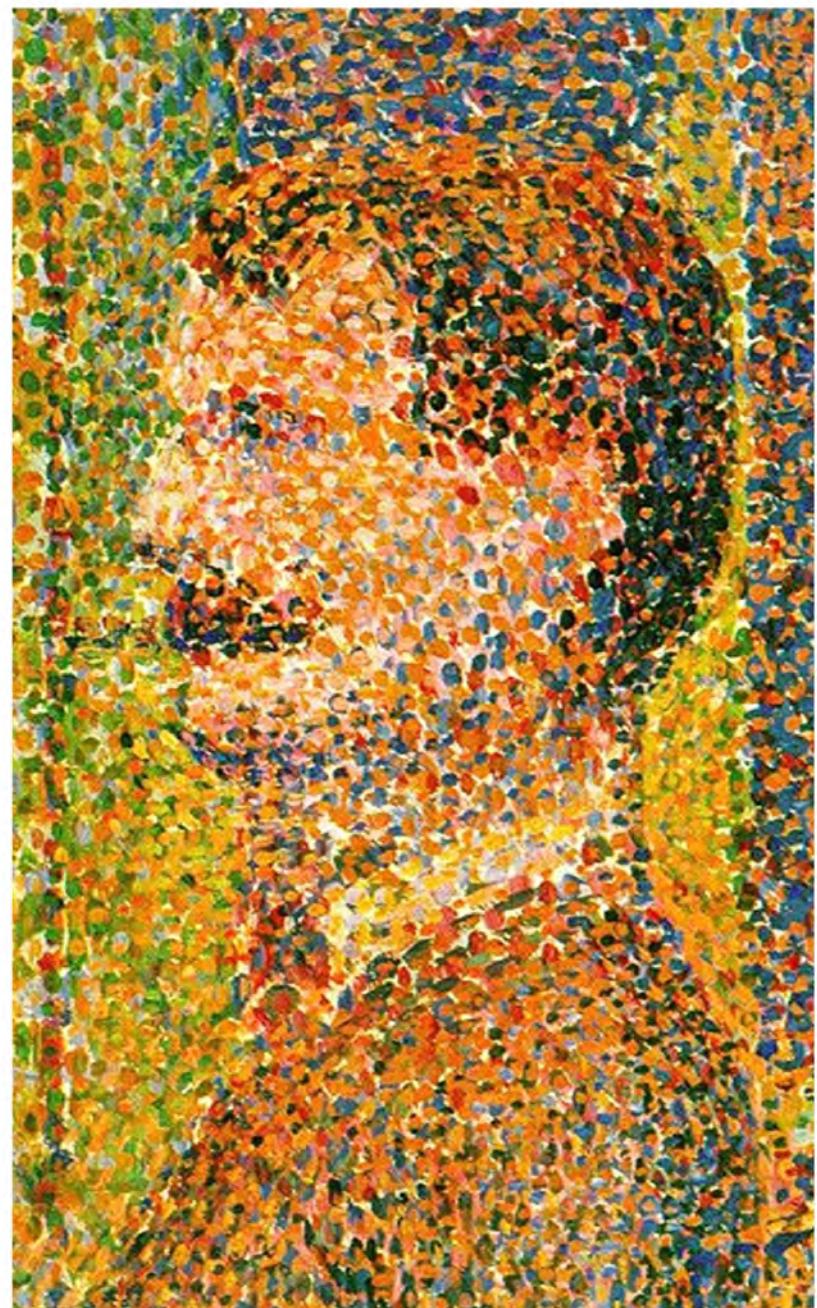


試料サイズ/形状で
応答性を変調させられる。

S. Tsubota, A. N. Hattori et al., Appl. Phys. Express, **10** (2017) 115001
A. N. Hattori et al., Crystals, **10** (2020) 631



「グランド・ジャット島の日曜日の午後」





複雑な挙動を制御して扱うためには

人の場合



個性たっぷりな大人数

代表的な数人を抽出し制御

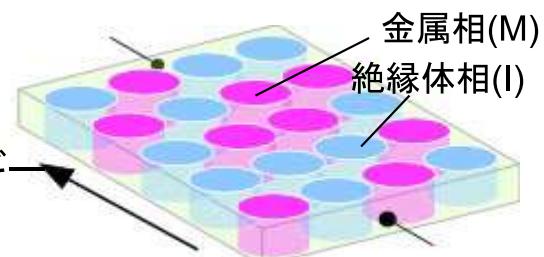


優秀な人を選別

金属酸化物

薄膜: 多数のスイッチ

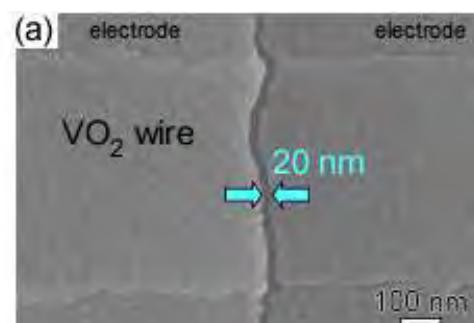
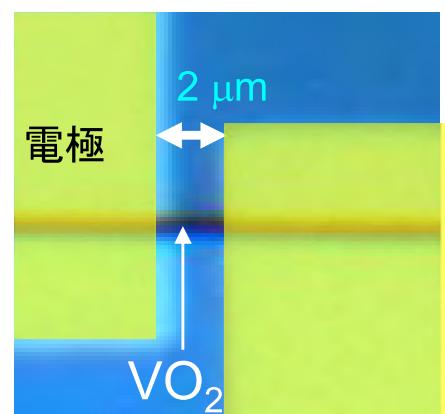
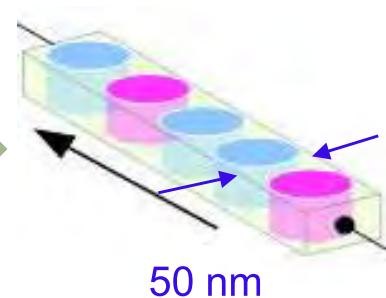
- ⌚ 緩慢な応答
- ⌚ 複雑な挙動
- ⌚ 高消費エネルギー



ナノ構造化

ナノ細線: 数個のスイッチ

- ⌚ 急峻な応答
- ⌚ 単純な挙動
- ⌚ 低消費エネルギー

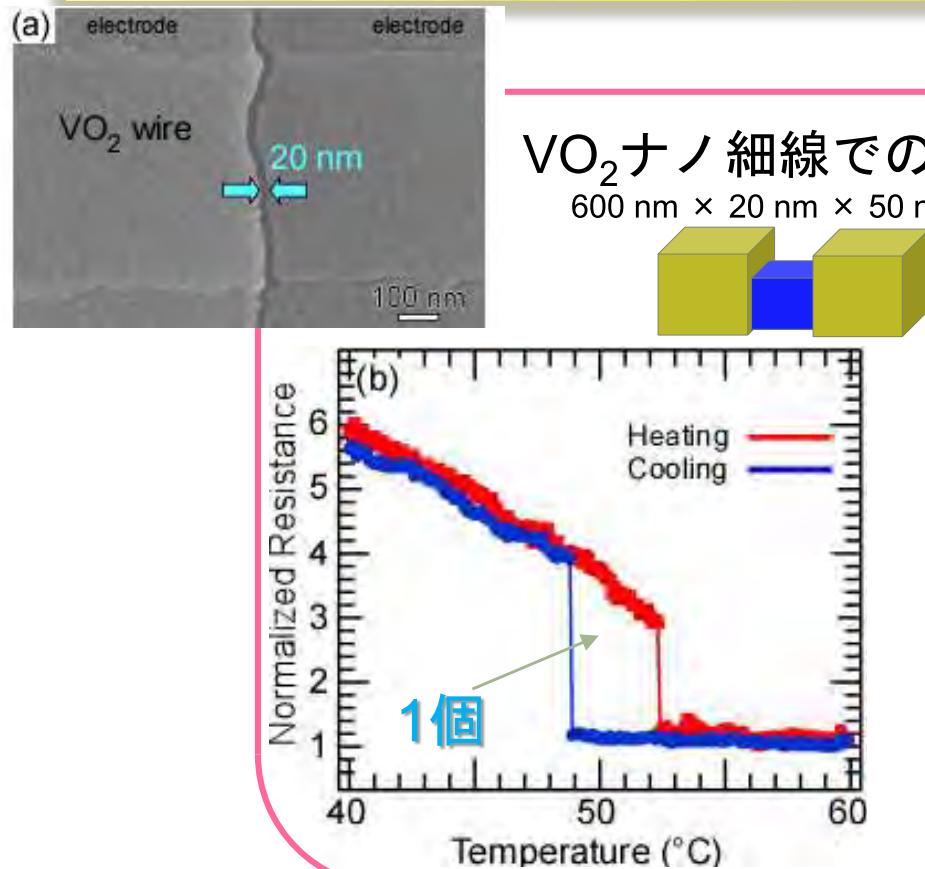


(a)

electrode
VO₂ wire
electrode
20 nm
100 nm

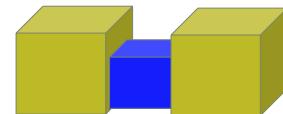


ナノ空間中への機能の選択的閉じ込め

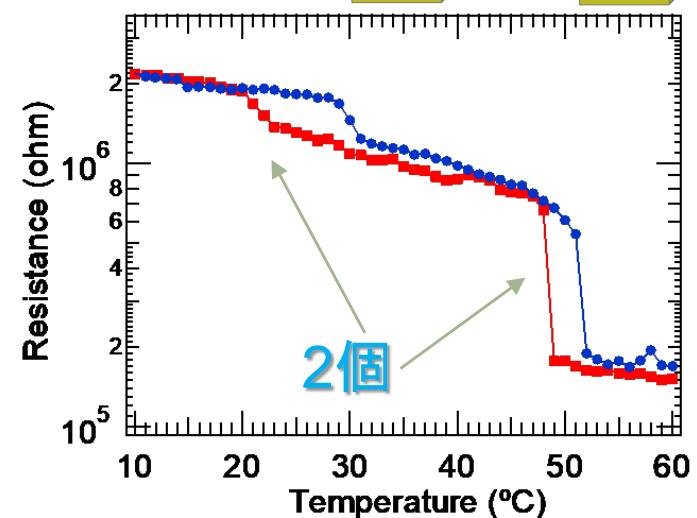
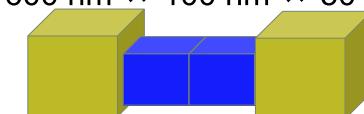


VO_2 ナノ細線での立体ナノ空間閉じ込め

$600 \text{ nm} \times 20 \text{ nm} \times 50 \text{ nm}$



$600 \text{ nm} \times 100 \text{ nm} \times 50 \text{ nm}$



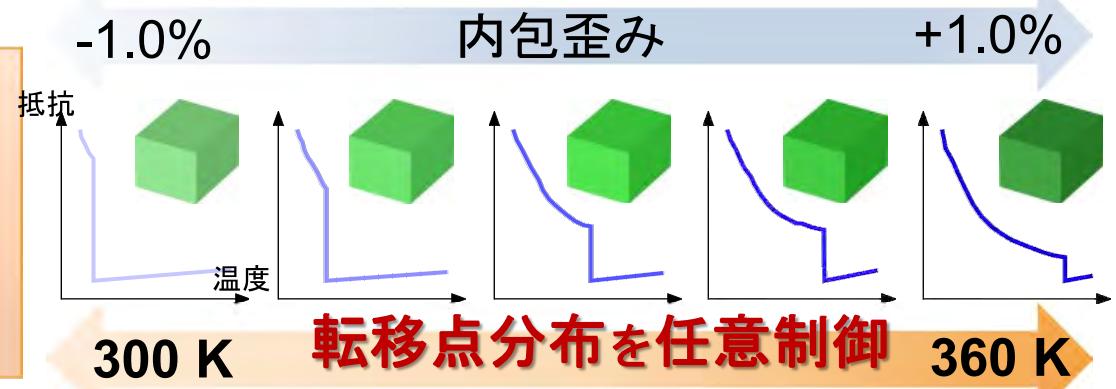
A. N. Hattori et al., Crystals, 10 (2020) 631

*抵抗変化の急峻さ

TCR: Temperature Coefficient of Resistance

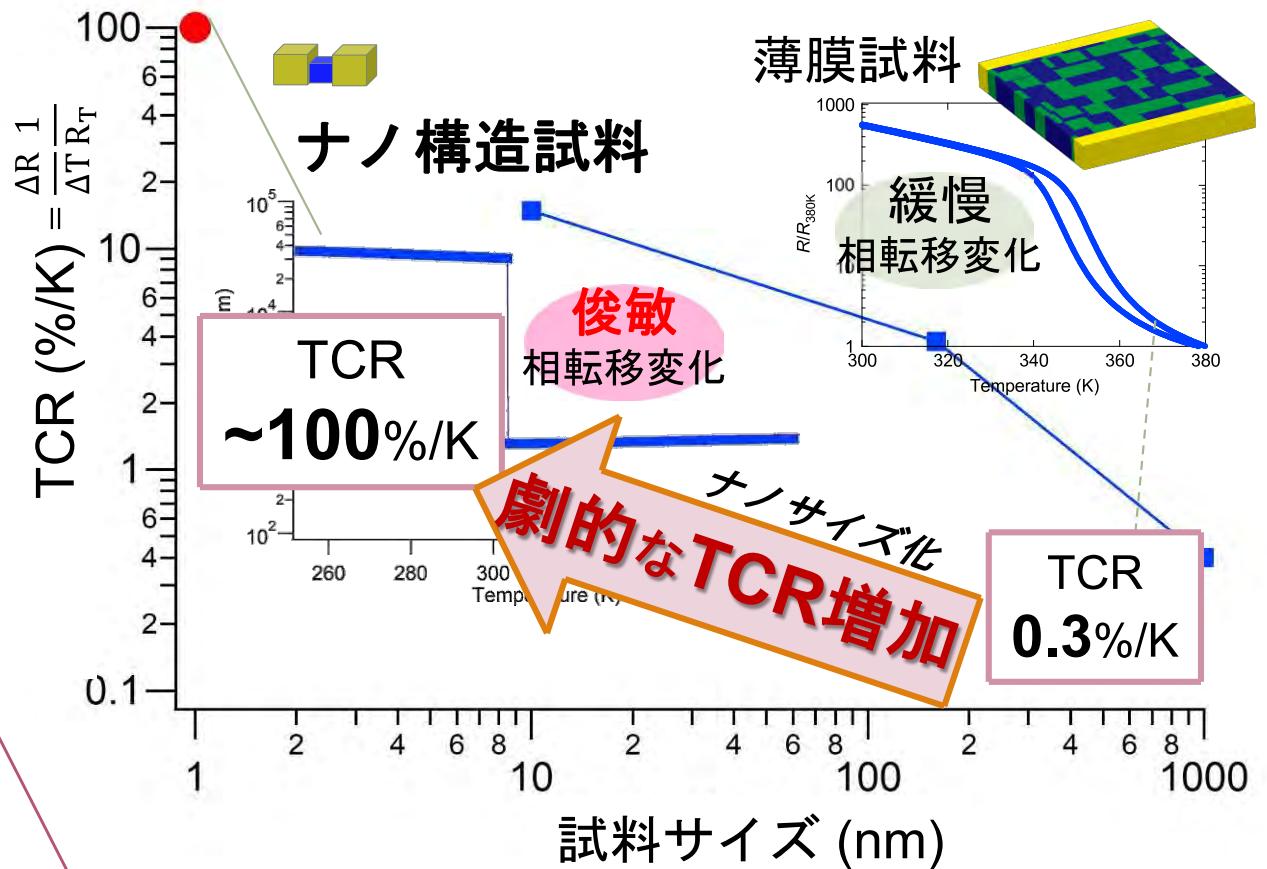
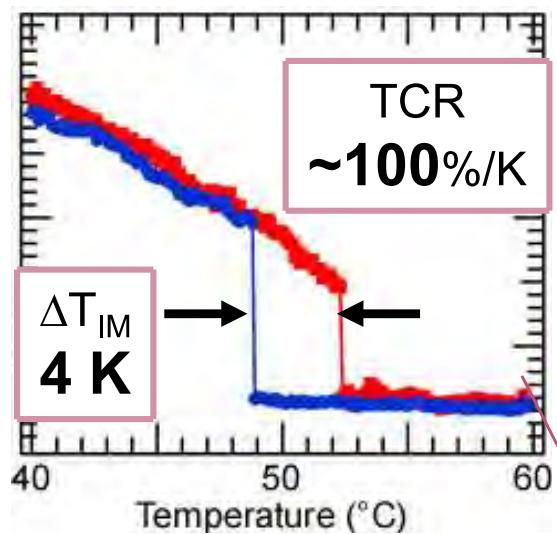
*抵抗変化の起こる回数と温度

転移温度: T_{IM}

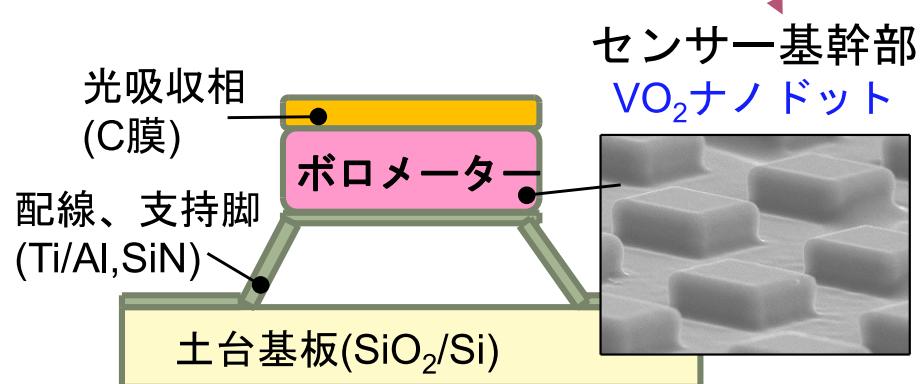




高感度マルチセンサー展開



小型高感度マルチガスセンサ



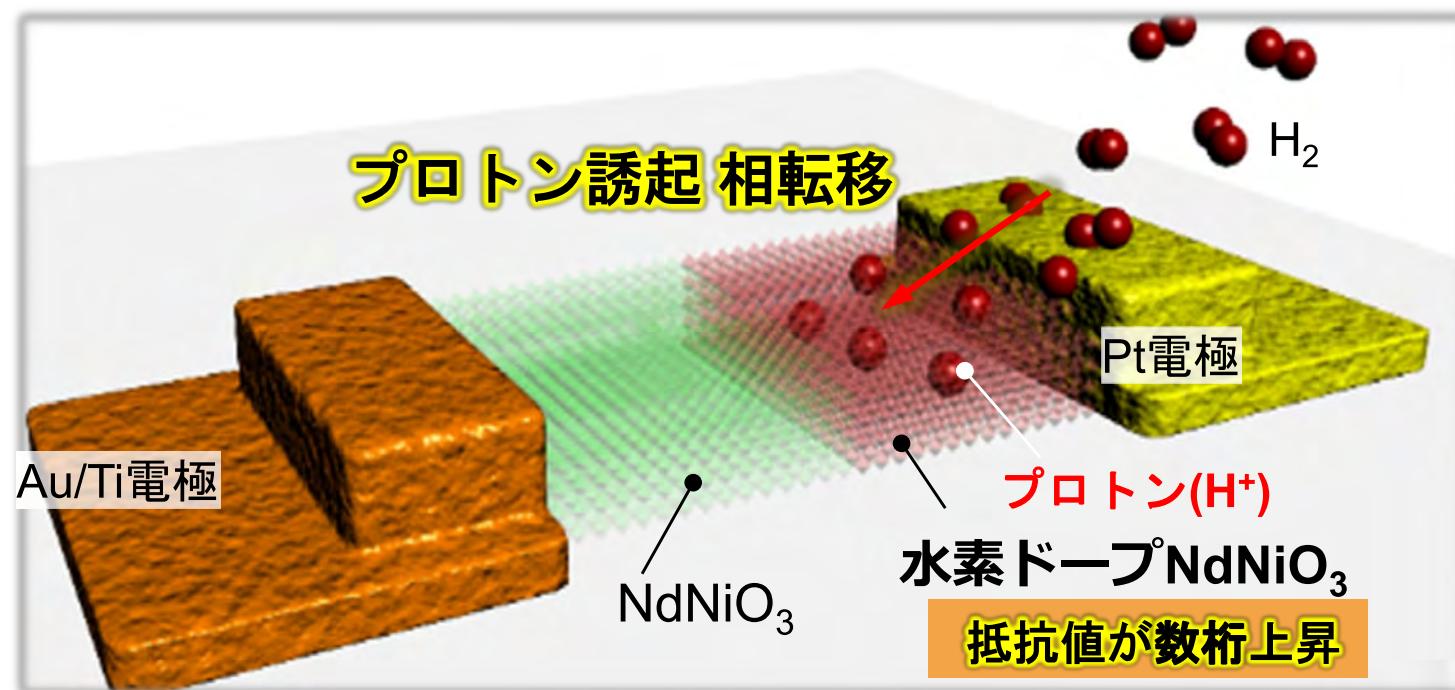
3次元ナノ構造体のサイズと形状の
人為的コントロール



2. プロトンレジスター

プロトエレクトロニクス/水素貯蔵

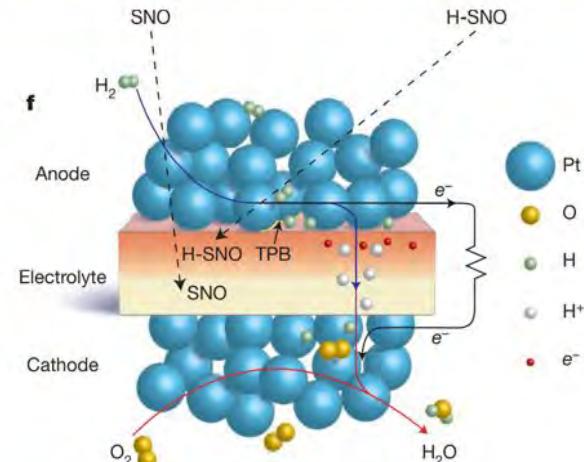
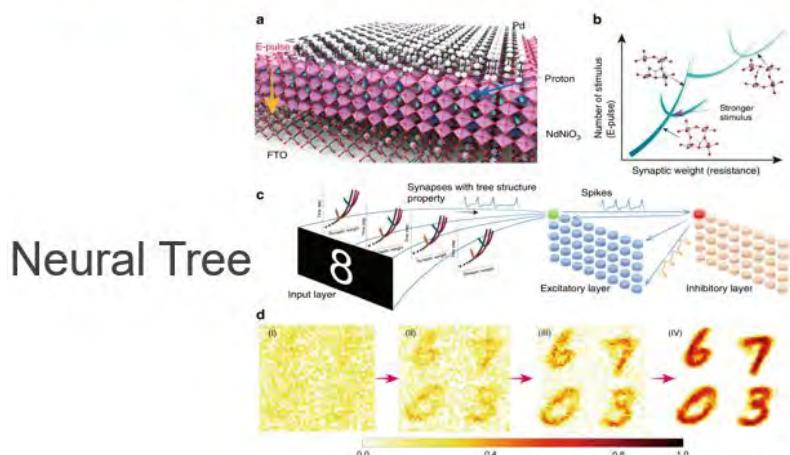
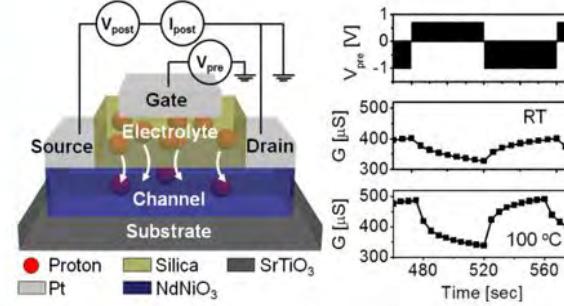
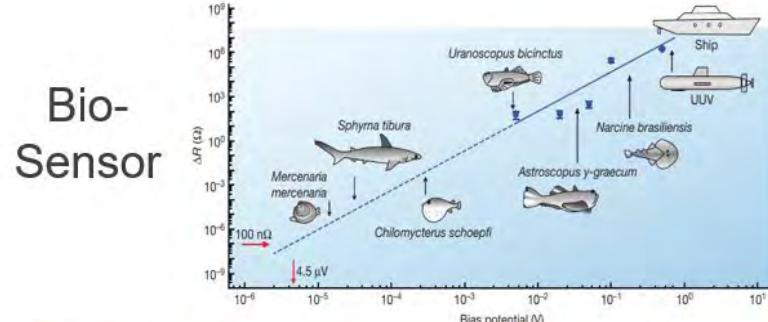
NdNiO_3





ReNiO₃と水素

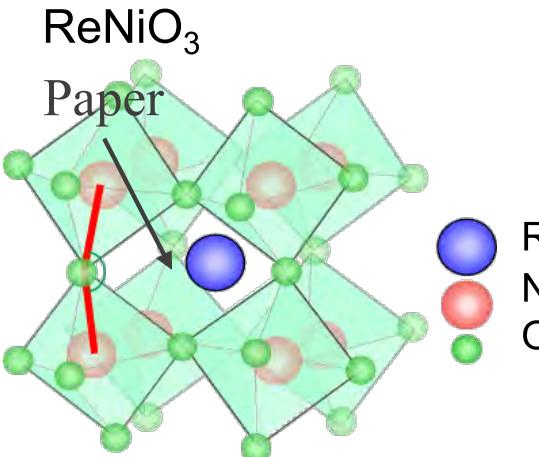
地球上で最も軽く、最も多く存在する原子





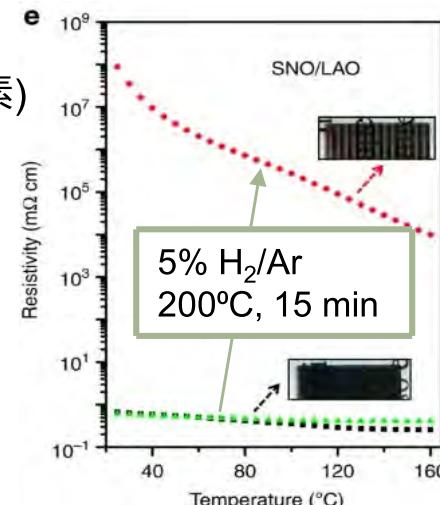
水素誘起相転移: $\text{ReNiO}_3\text{-H}$

水素誘起相転移



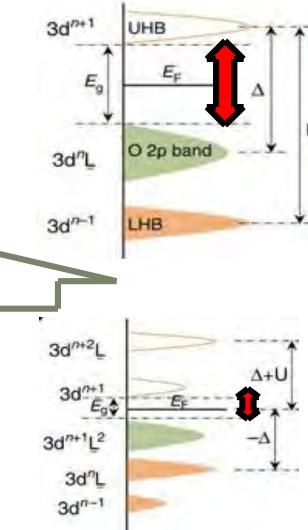
抵抗値の変化: $10^1\text{-}10^8$ 倍

例: SmNiO_3 (SNO)へのプロトンドープ



E_g : 大
絶縁体

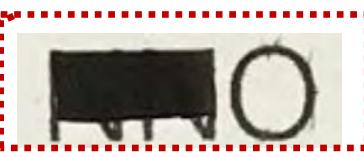
E_g : 小
金属



Nat. Commun. 5 (2014) 4860.

例: NdNiO_3 (NNO)へのプロトンドープ

NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO
NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO



NNO ($5 \times 10 \text{ mm}^2$)



水素ドープNNO-1

色の変化: 黒→透明



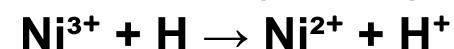
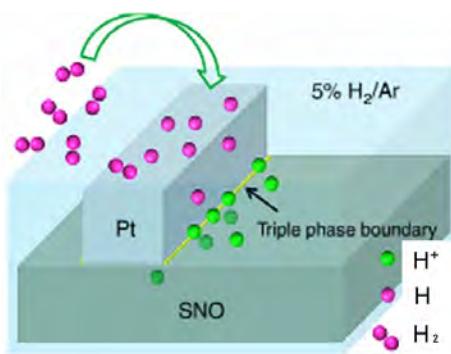
水素ドープNNO-2



水素誘起相転移の特徴

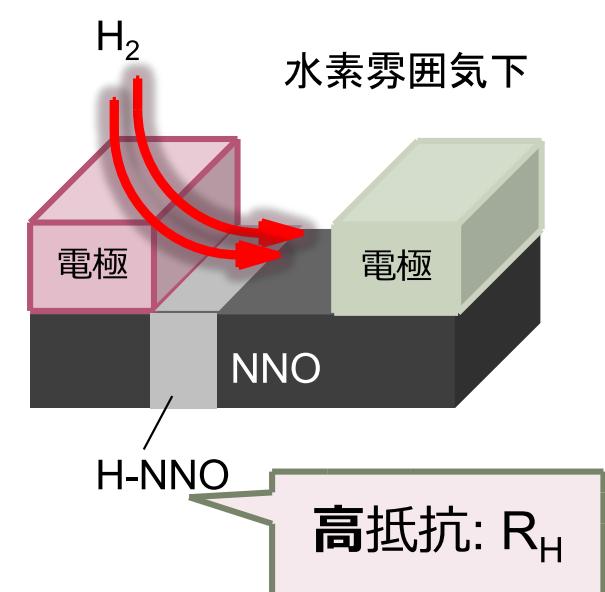
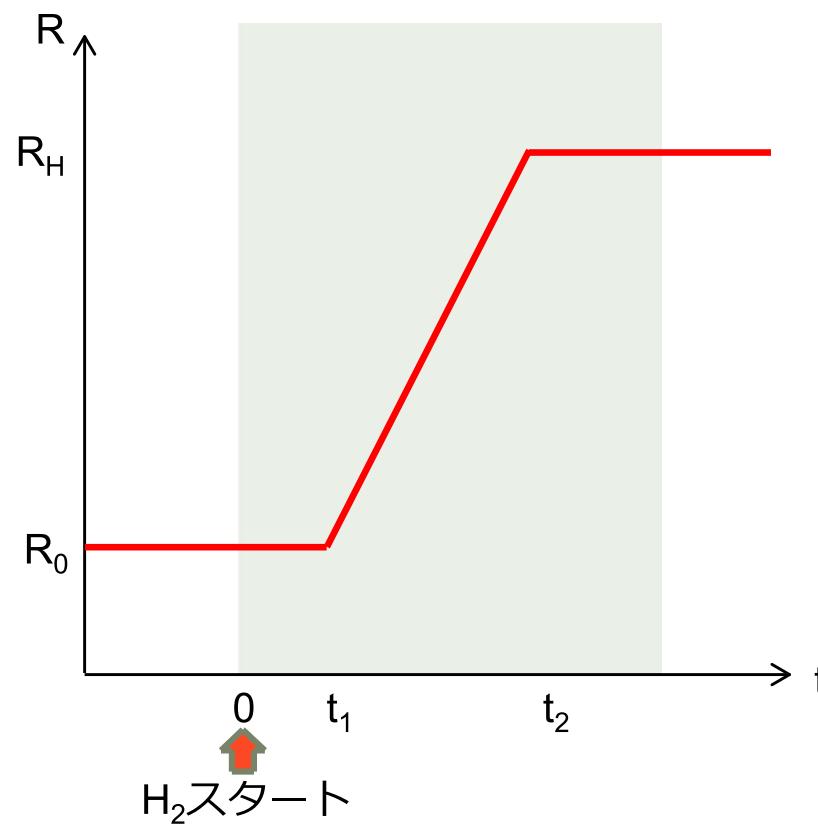
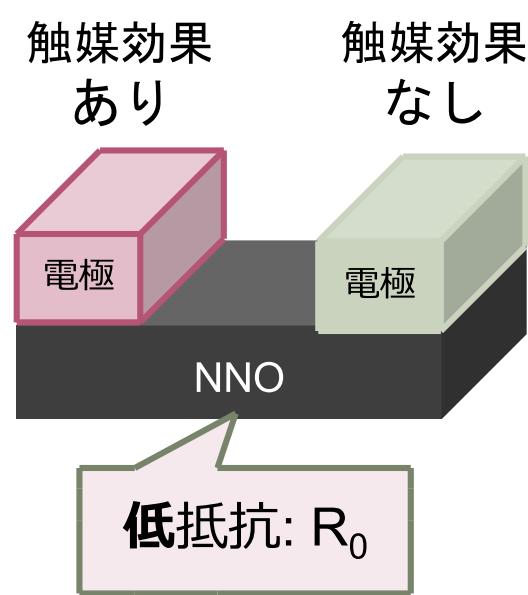
触媒効果を利用した水素ドープ

Pt接触部分の水素とNiイオンの反応



Nat. Commun. 5 (2014) 4860.

水素雰囲気下での抵抗スイッチング

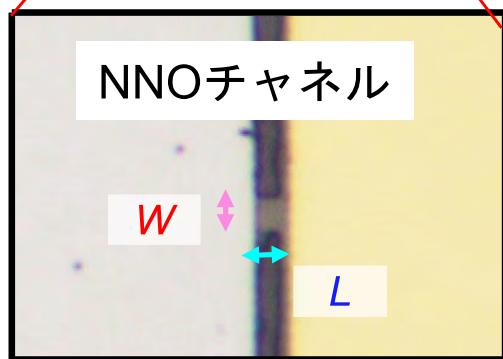
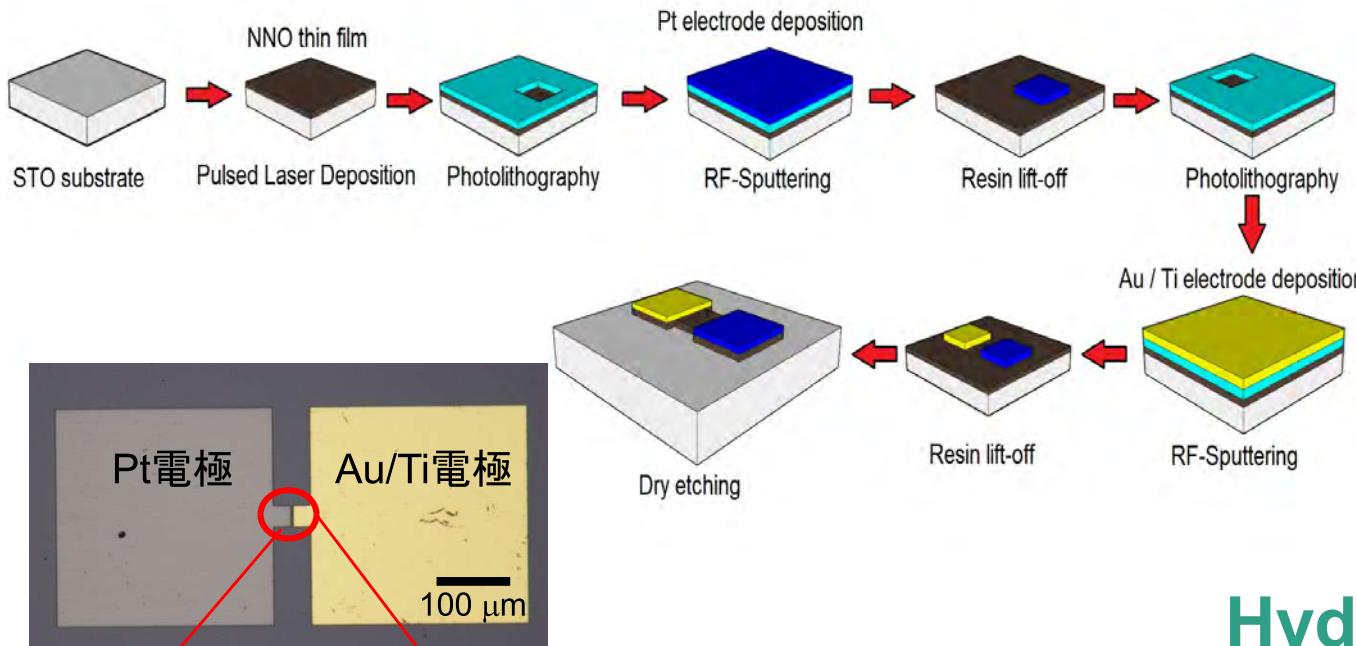




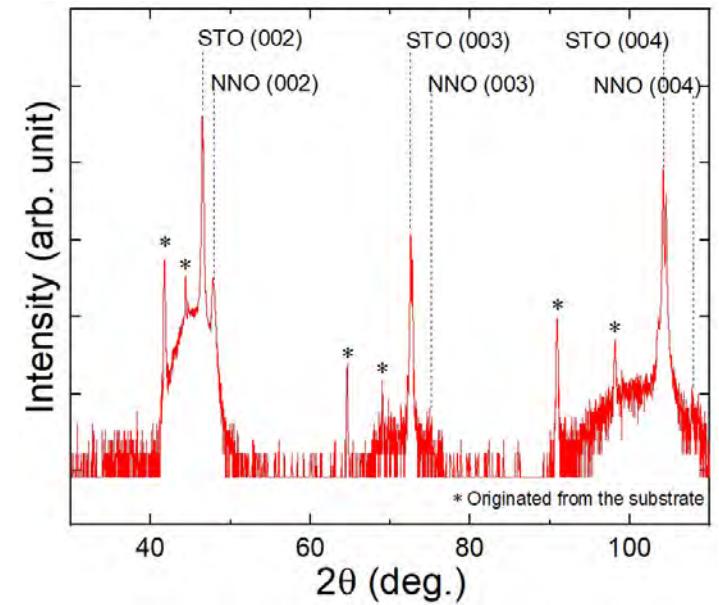
非対称電極構造: プロトンレジスター構造

Device fabrication

PLD (ArF, $\lambda=193$ nm): $P_{\text{base}} = 10^{-6}$ Pa, $P_{\text{O}_2} = 30$ Pa, $T = 650^\circ \text{C}$, $f = 3$ Hz, $E = 90$ mJ

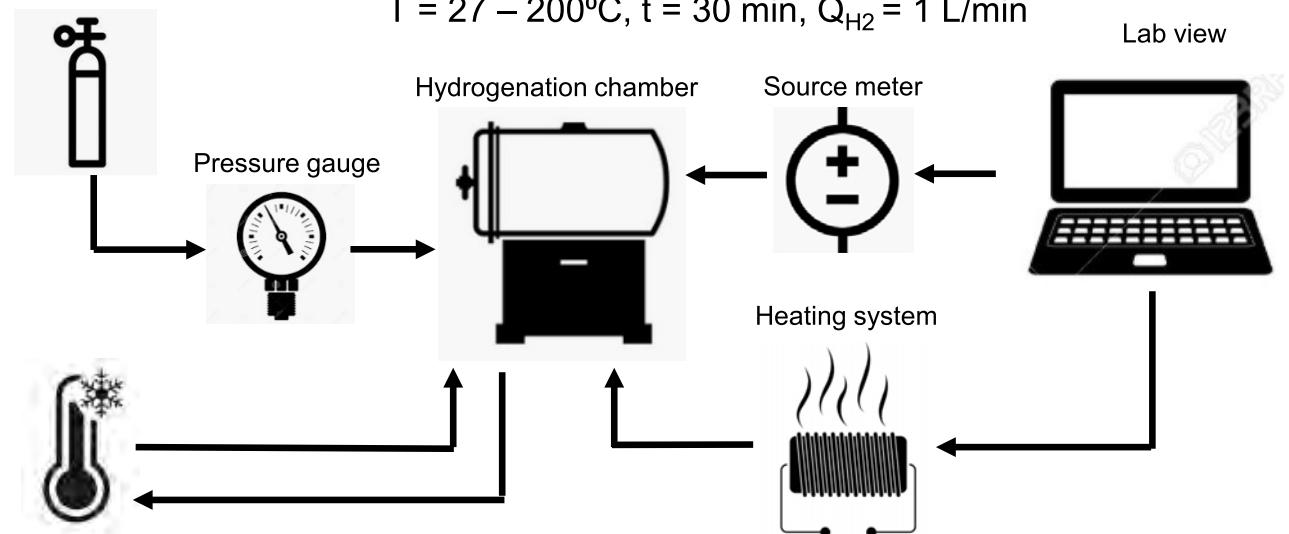


XRD of NdNiO₃ (NNO) thin film



Hydrogenation

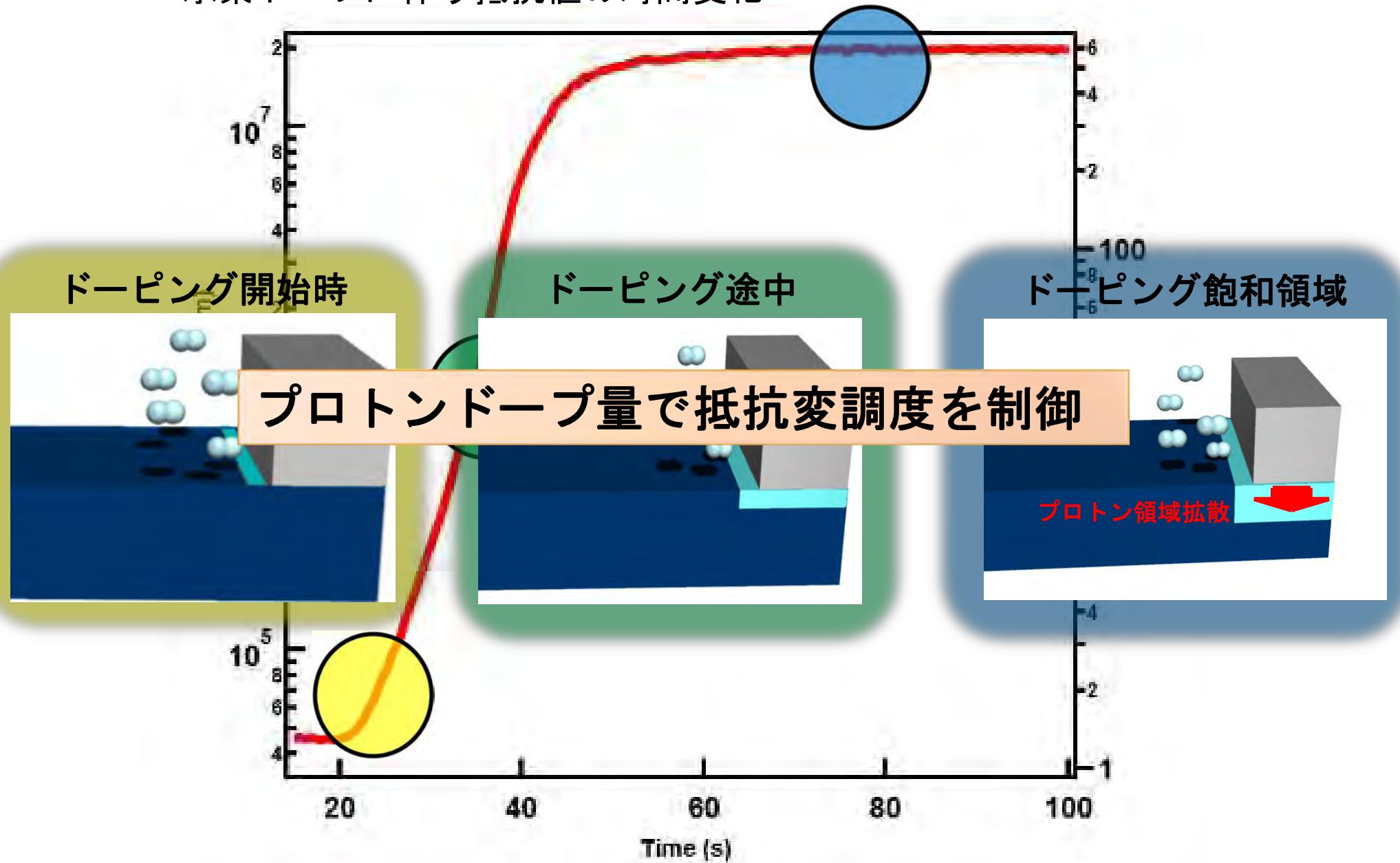
$T = 27 - 200^\circ \text{C}$, $t = 30 \text{ min}$, $Q_{\text{H}_2} = 1 \text{ L/min}$





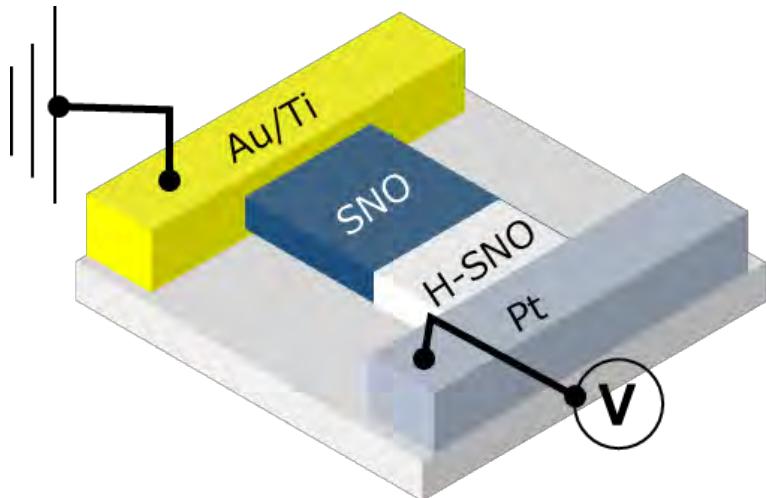
プロトンドープによる抵抗変調

水素ドープに伴う抵抗値の時間変化

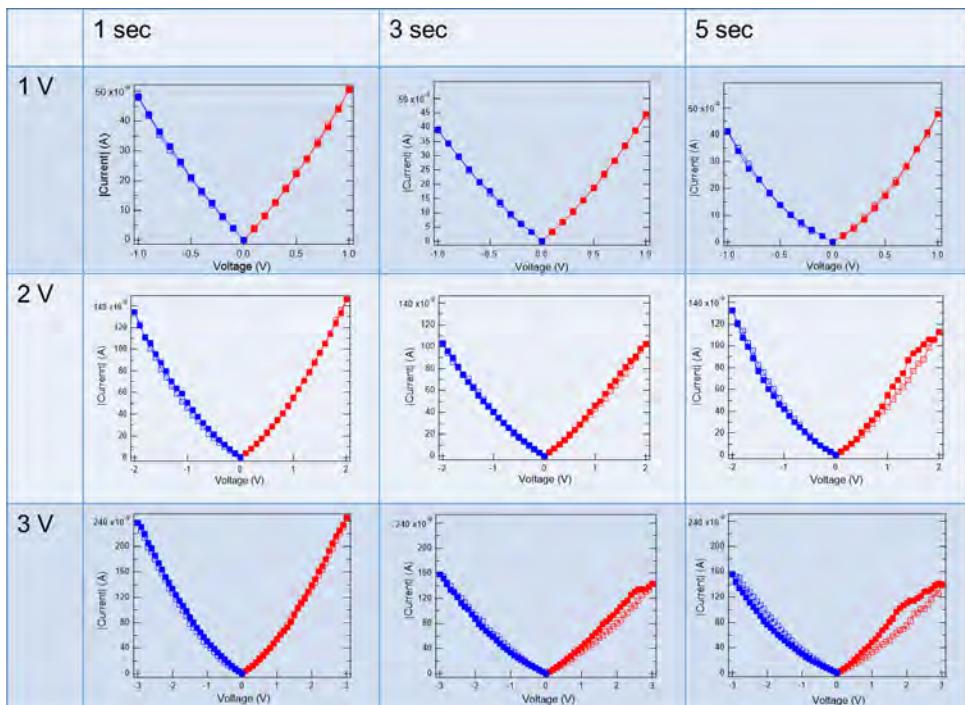




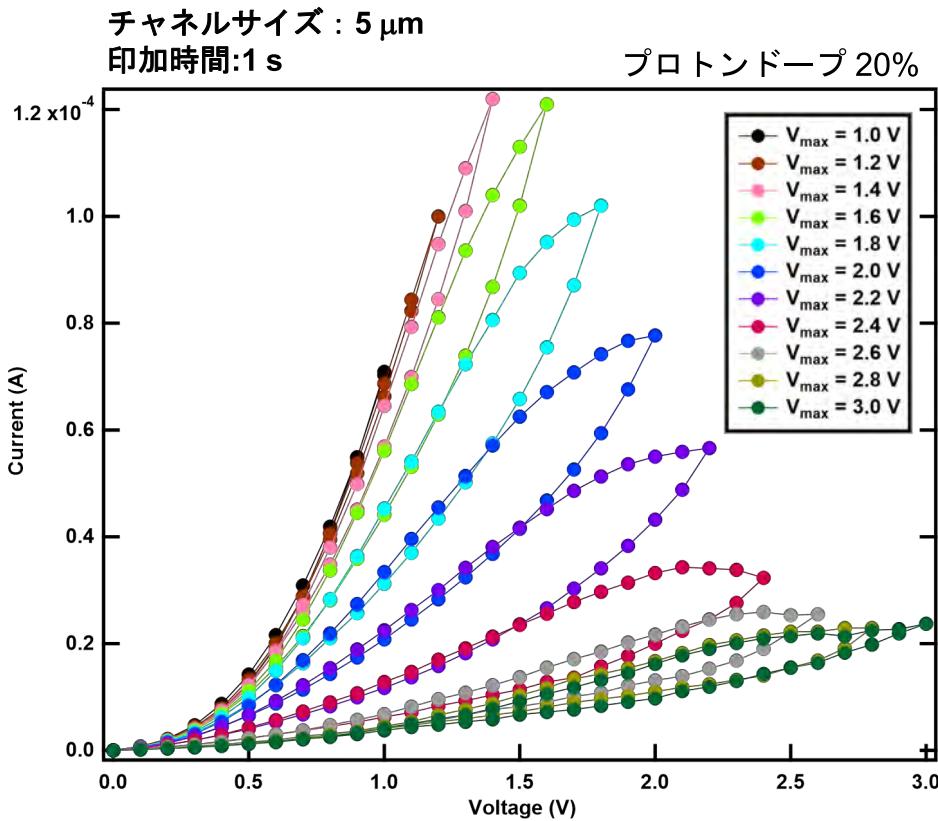
プロトンレジスター



電圧時間依存のメモリ効果

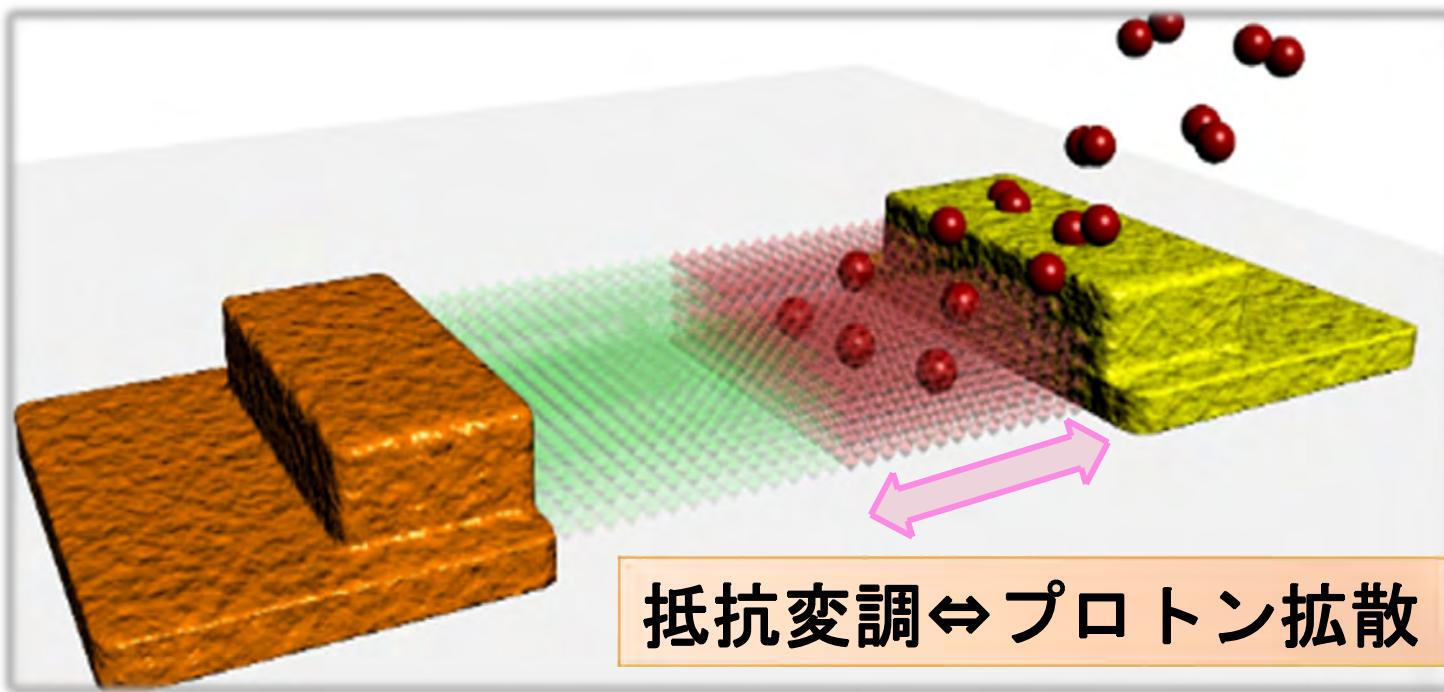


電圧履歴依存のメモリ効果





プロトンレジスターの性能向上

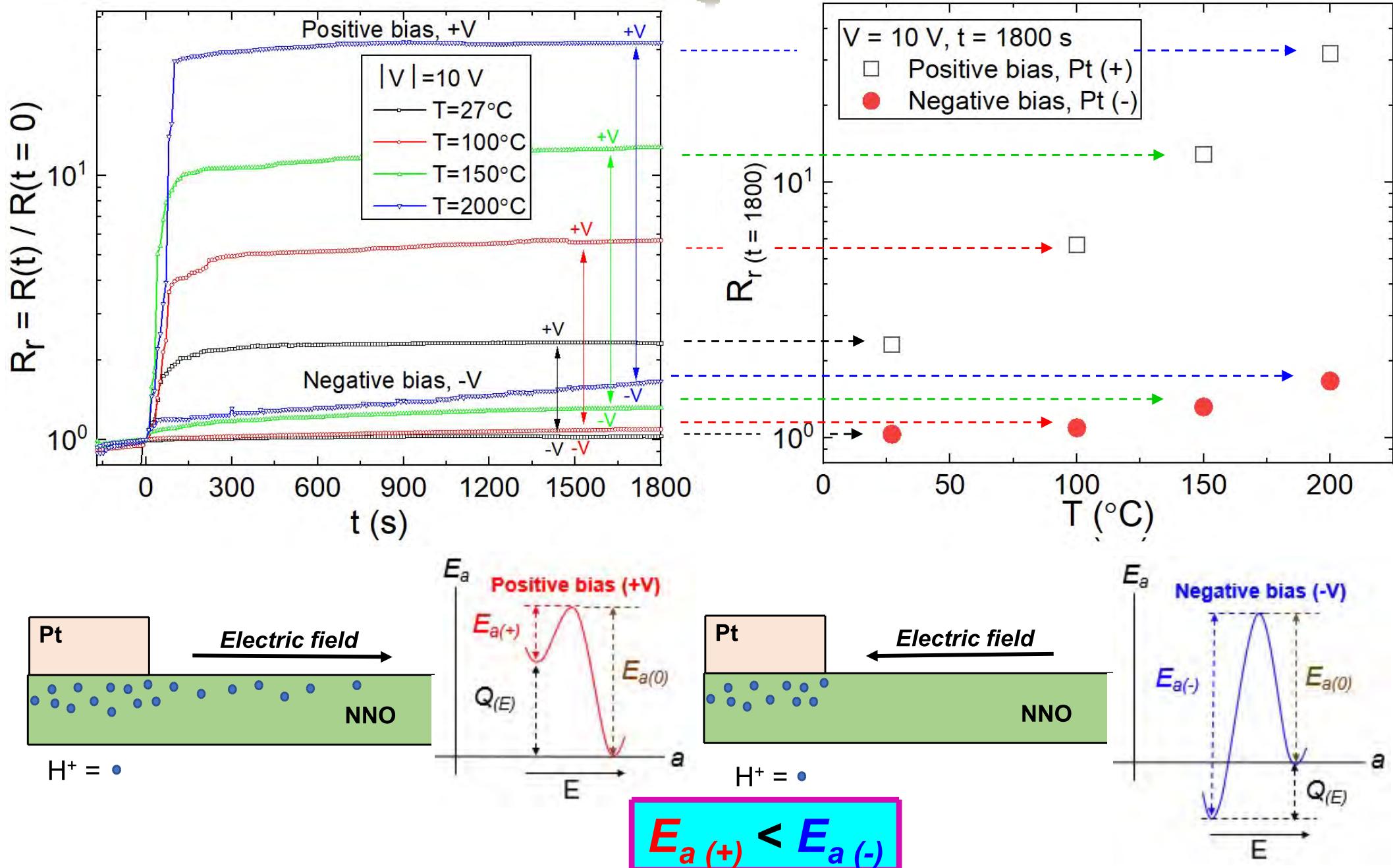


機能向上の方法

- 1 電圧アシストによるプロトン拡散促進
- 2 ナノ構造化によるプロトン密度の増加

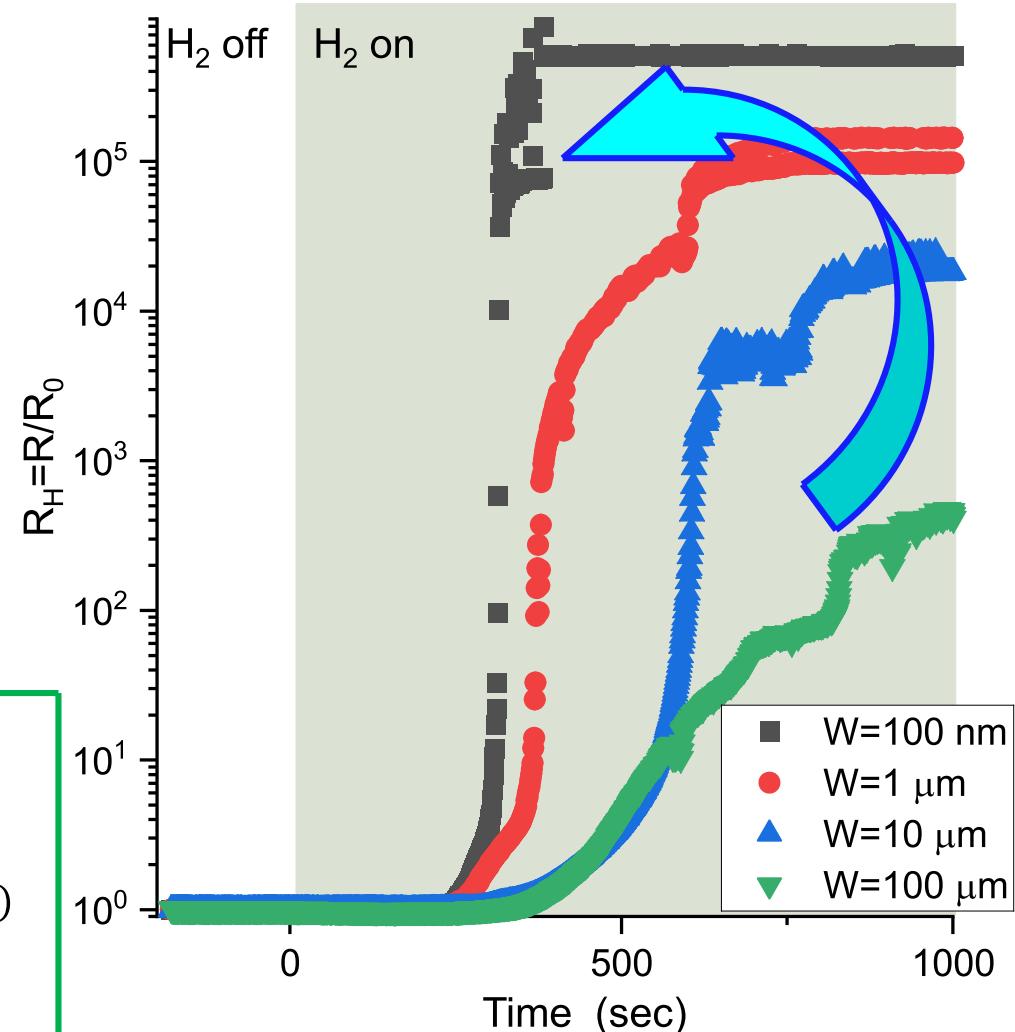
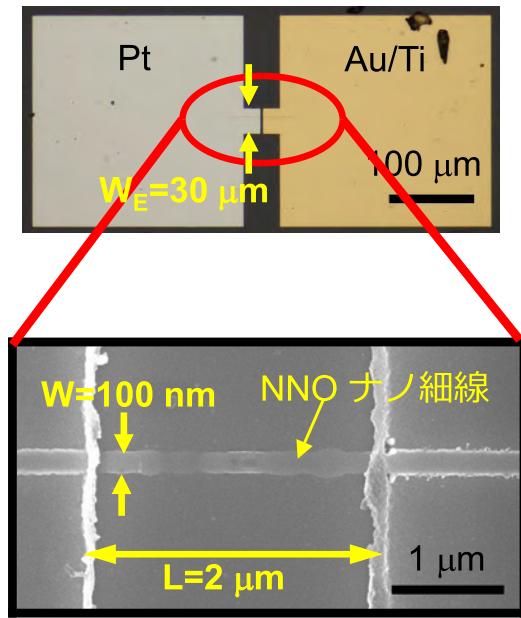


水素拡散の促進



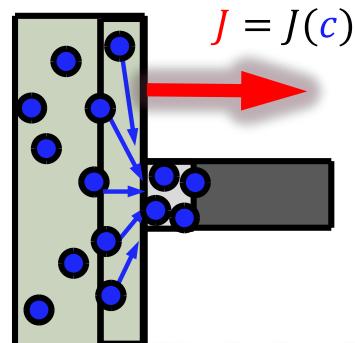


ナノ細線レジスター



吸収・拡散過程

拡散速度: J
プロトン供給密度: c



プロトン供給密度が増加し 拡散速度が増加

ナノサイズ化→抵抗変調速度の増加

ナノ構造体の独自作製方法

Bottom-up: 蒸着 → ■ → ■

成長条件の制御困難

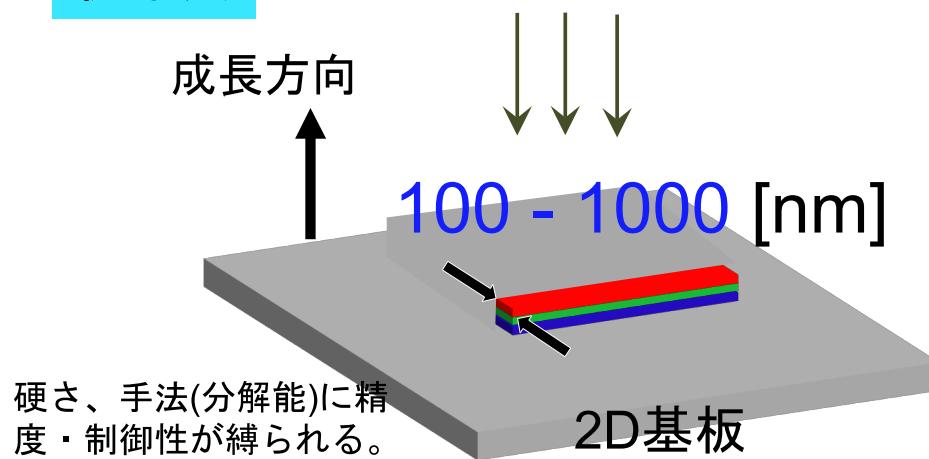
位置、形状、サイズ、組み合わせ

Top-down: 加工 → ■ → ■

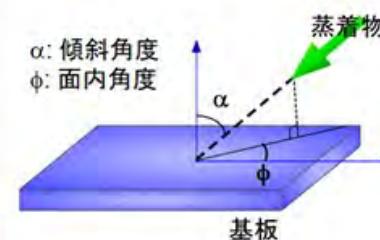
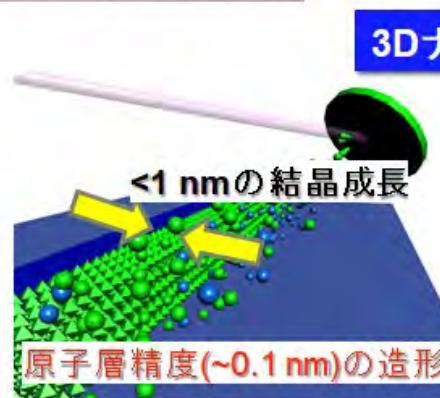
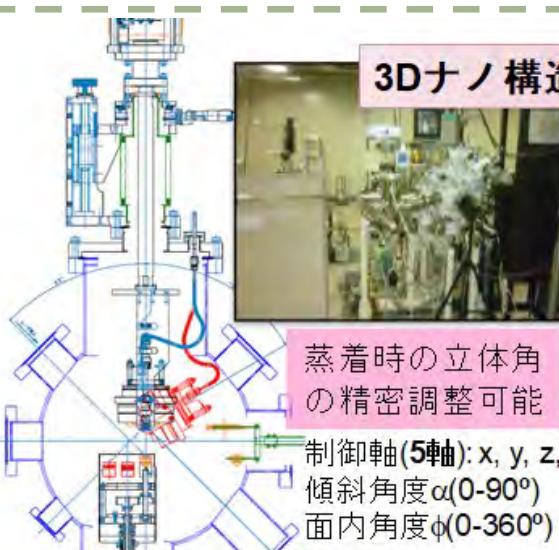
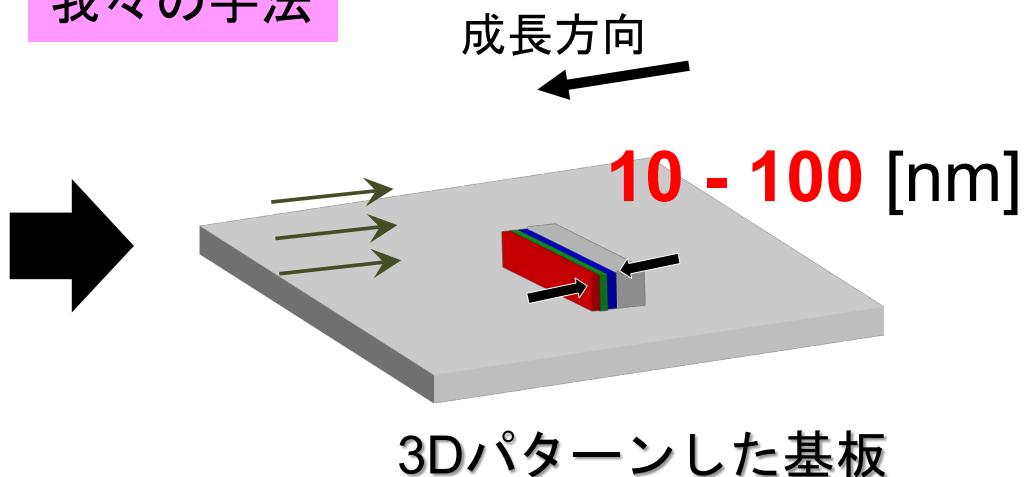
加工精度の限界

形状、サイズの分解能

従来法



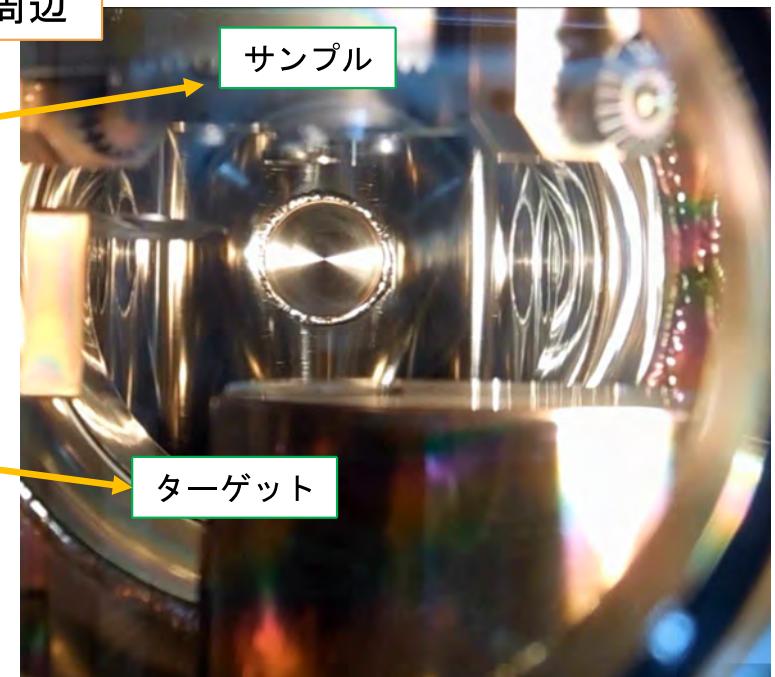
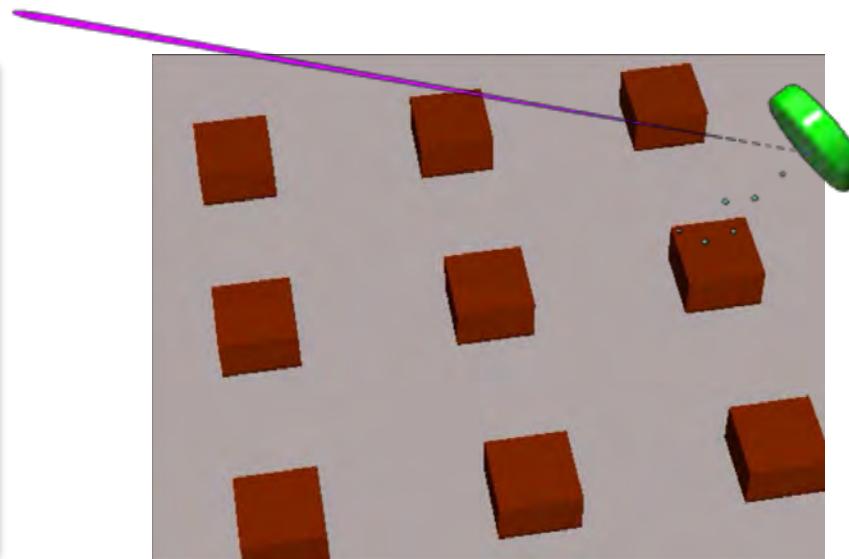
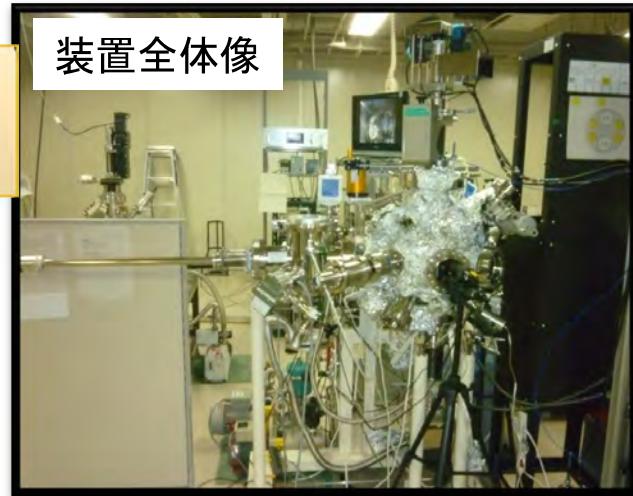
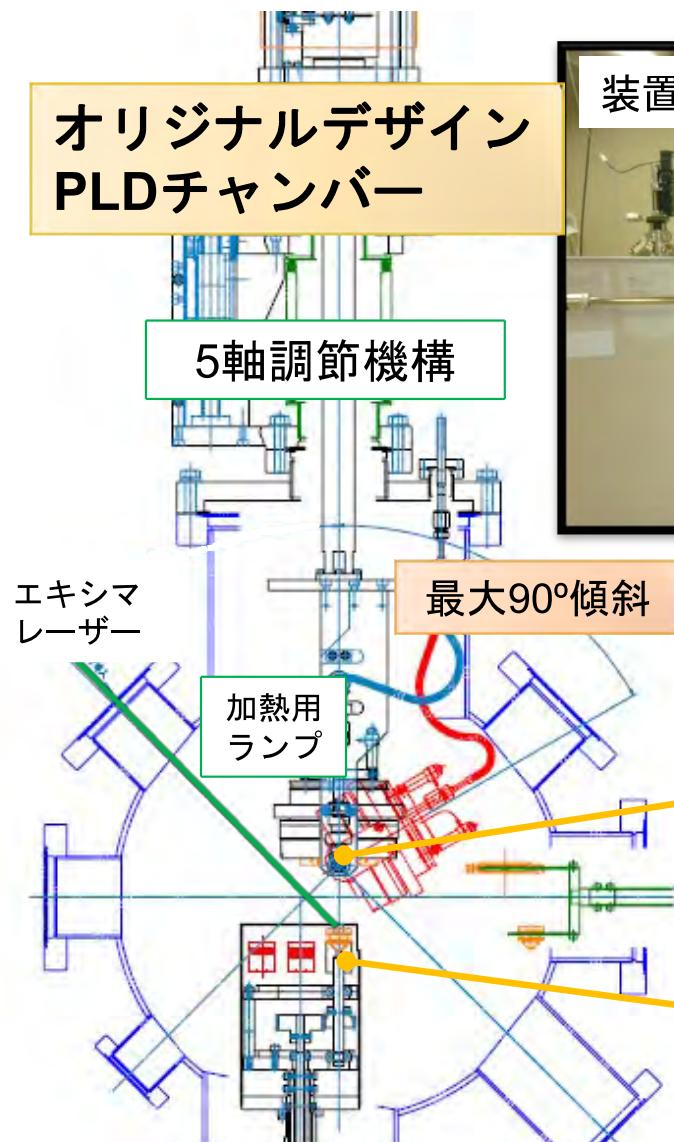
我々の手法



従来の限界を超えた3次元ナノ構造の形成が可能



ナノ構造成長の独自装置



ベース真空度: 1×10^{-7} [Pa]

プロセスガス: 酸素、Ar (10^{-6} - 10^4 [Pa])

温度: 室温-800°C

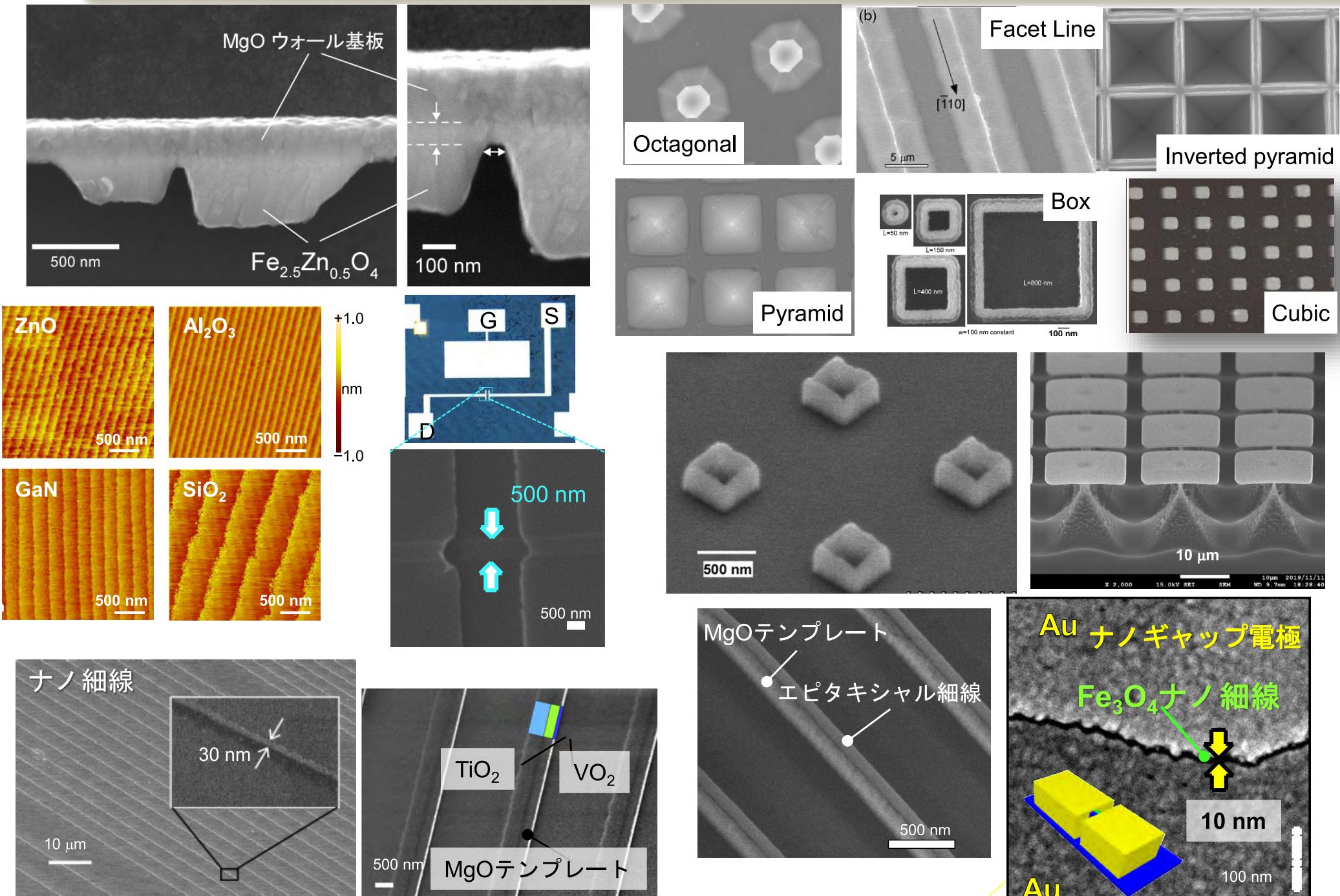
制御軸(5軸): x, y, z,

傾斜角度 α (0-90°)

面内角度 ϕ (0-360°)



機能性材料の3次元ナノ立体構造

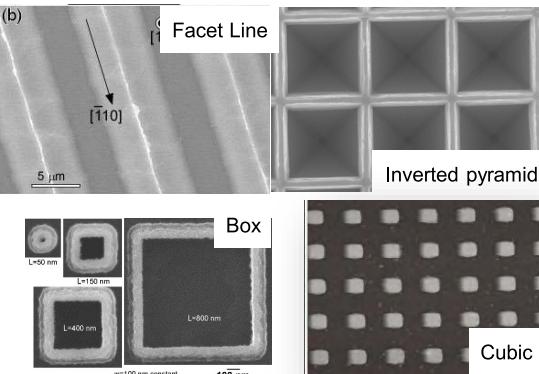
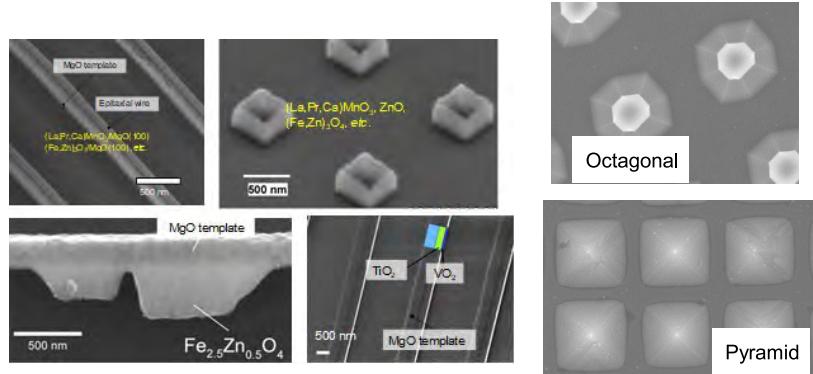




ミクロ立体構造制御とデバイス応用

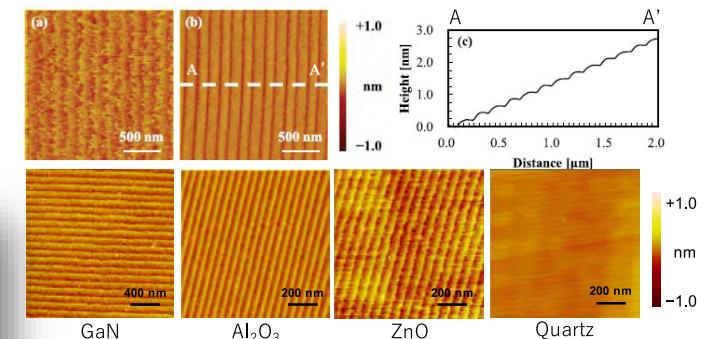
極限3次元ナノ構造形成技術の開発

Extremely small 3D nanostructure fabrication technique



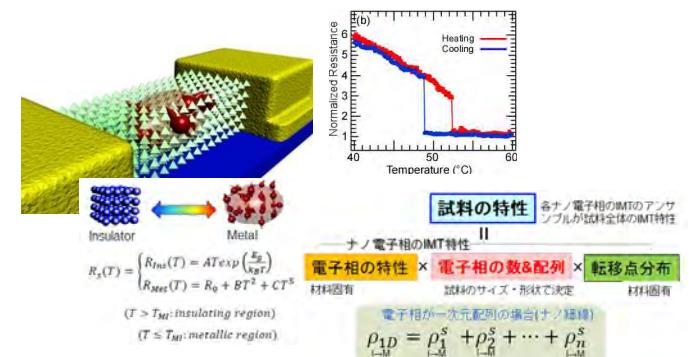
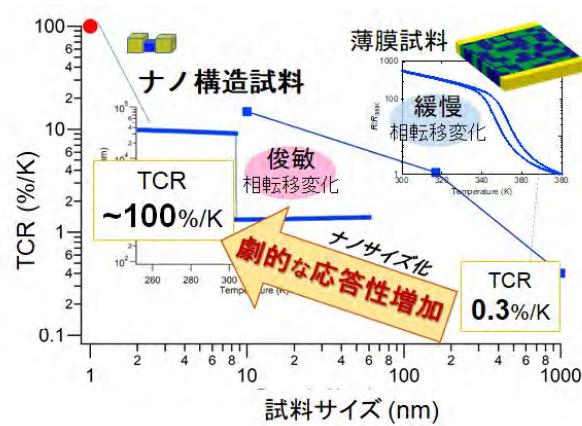
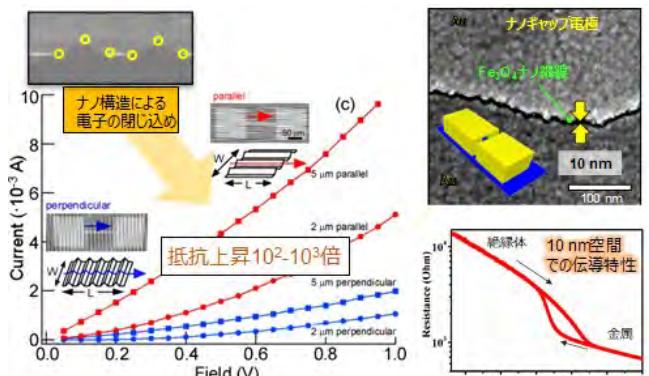
完全結晶表面の創製と機能性材料成長

Construction of crystallographically ordered surface



立体ナノ構造化試料のナノ物性研究・デバイス展開

Physical property research of 3D nanostructure materials and device application



感谢收听!